

SPring-8利用推進協議会 先端磁性材料研究会 第3回研究会
「パターン媒体の先端技術開発とナノ磁気イメージングからのアプローチ」

熱アシスト記録媒体用 FePt系合金薄膜の作製と磁化過程解析

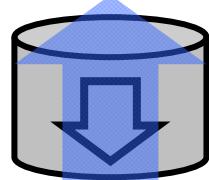
中川 茂樹
緒方 祐史, 今井 康晴

東京工業大学大学院
理工学研究科電子物理工学専攻

磁気記録のトリレンマ

熱アシスト磁気記録

室温



$$H_k \geq 10\text{T}$$

高温



$$H_k \downarrow$$

高S/N比
(微細粒化)

粒子体積V減少

$$\frac{K_u V}{k_B T} \ll 50$$

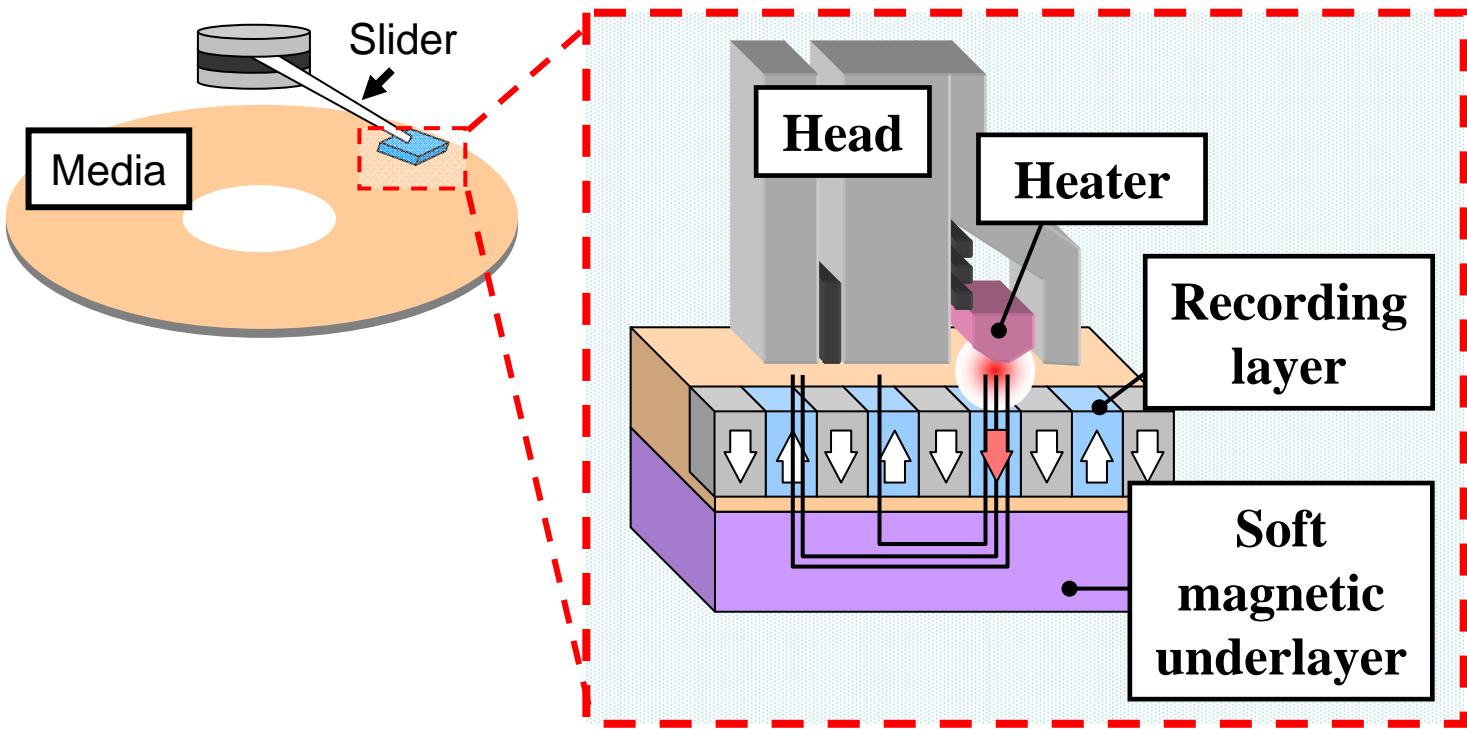
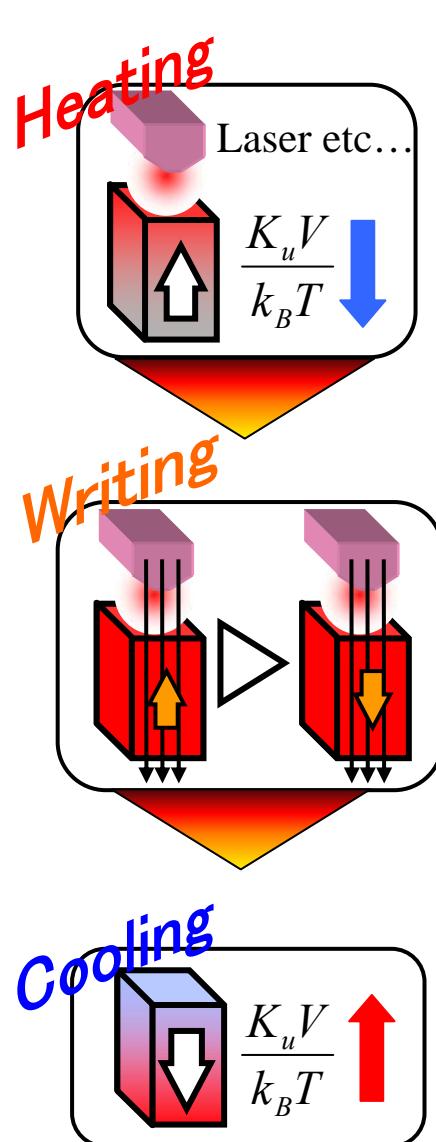
ヘッドの
磁界強度

熱安定性

High- K_u 材料

$$\frac{K_u V}{k_B T} \gg 50$$

熱アシスト磁気記録 (HAMR)



Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR)

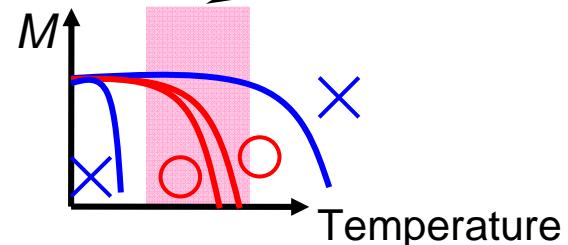
1. Heating a part of media using heater (e.g. laser) and Thermal stability factor $K_u V/k_B T$ decreases.
2. Decrease of $K_u V/k_B T$ cause decrease of coercivity H_C . Therefore, magnetization of a part of media can be reversed.
3. After reversing, $K_u V/k_B T$ increase to former value by cooling

熱アシスト磁気記録媒体に求められる物性

① 热アシスト領域のキュリー温度

- ✓ 热アシスト加熱温度: ~200 °C
 - ➡ 200 °C付近で十分小さな保磁力
 - ➡ 200 °C付近のキュリー点

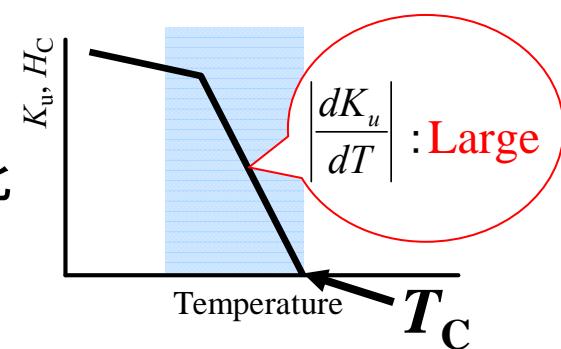
热アシスト加熱領域 (~200°C)



② キュリー温度近傍の急峻な熱応答性

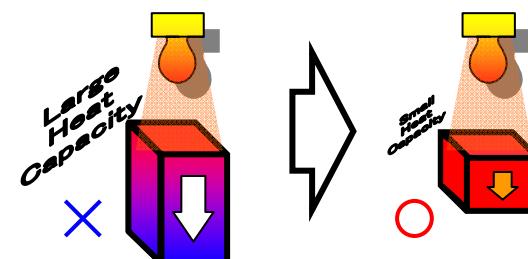
- ✓ 热擾乱が顯著な領域を最小にする
 - ➡ 急峻な熱応答により热搖らぎ時間を最小化
- ✓ 短時間照射効果による热擾乱の最小化

Ref : Kikitsu, T et al. IEEE Trans.Magn. n37, (2001). 1250



③ 热容量小(薄膜)

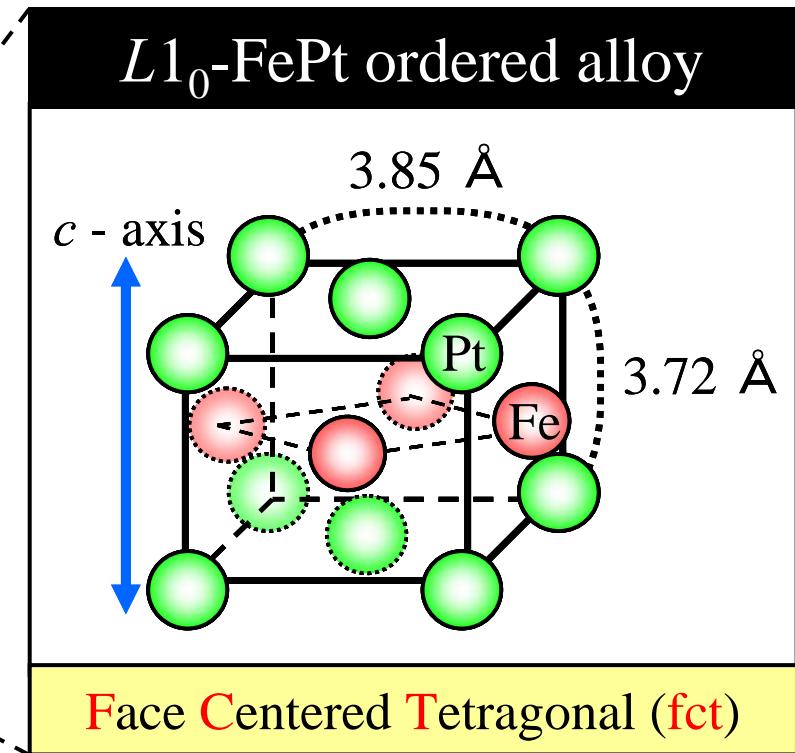
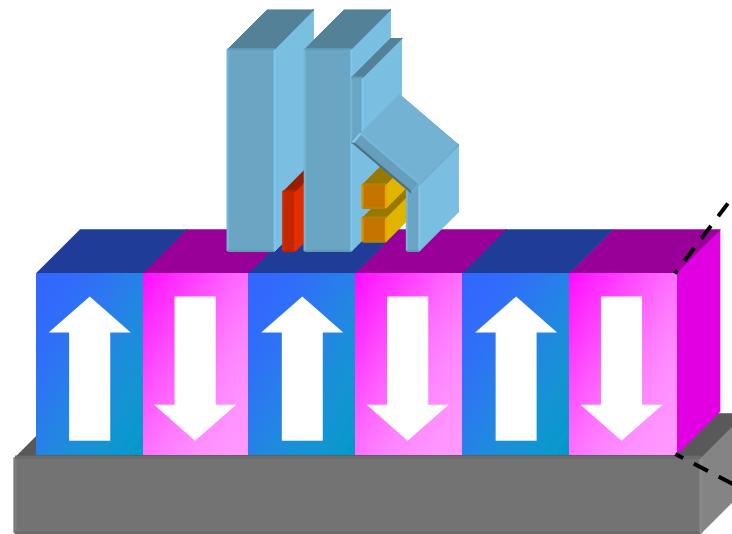
- ✓ 最小限の加熱時間
- ✓ 十分な温度上昇



- 1 Fe/Pt二層膜によるc-軸配向FePt規則合金膜
- 2 Fe/Pt/X三層膜による第三元素の添加効果
- 3 異常Hall効果によるFePt合金膜の磁化過程
解析と裏打ち軟磁性層との磁気結合評価

$L1_0$ -FePt規則合金

HDD(垂直磁気記録)



● 高い一軸磁気異方性

$$K_u = 7.0 \times 10^7 \text{ (erg/cc)}$$

➡ 現存のCo系合金 $2.0 \times 10^6 \text{ (erg/cc)}$

● 第三元素添加による特性制御性

Cu, Ag, SiO_2 etc.

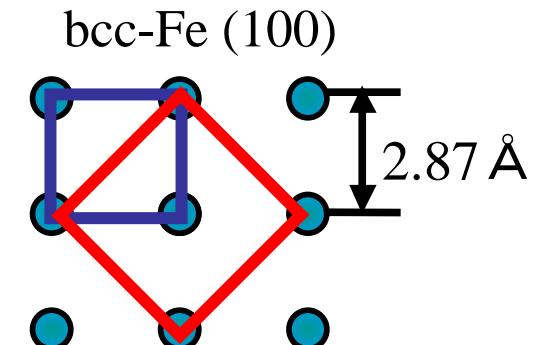
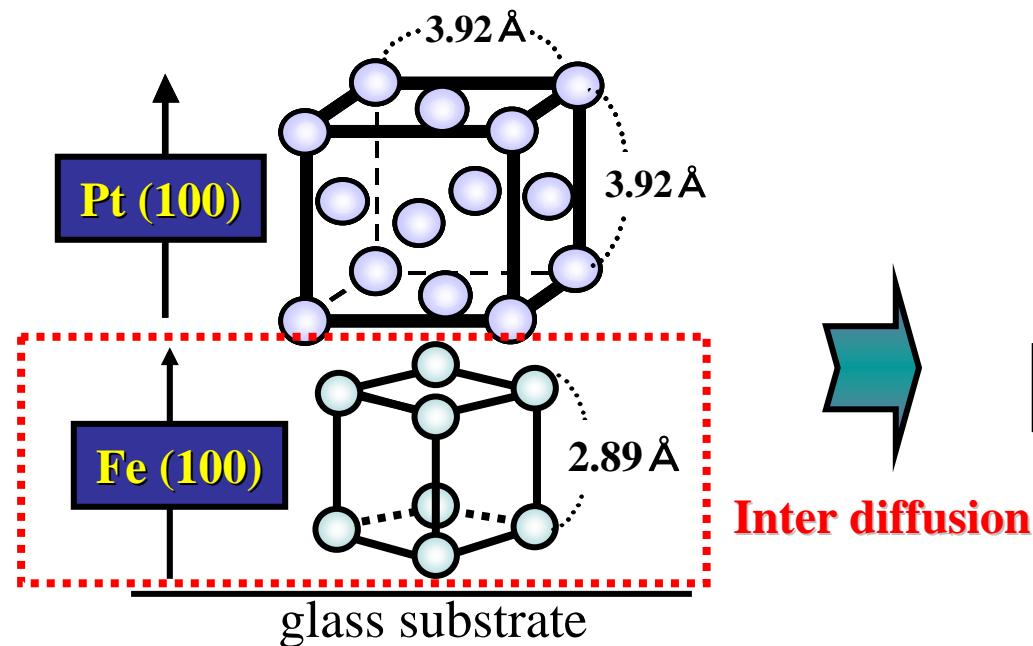
➡ キュリー点制御やグラニュラー化

We can get (001) orientation of FePt ordered alloy

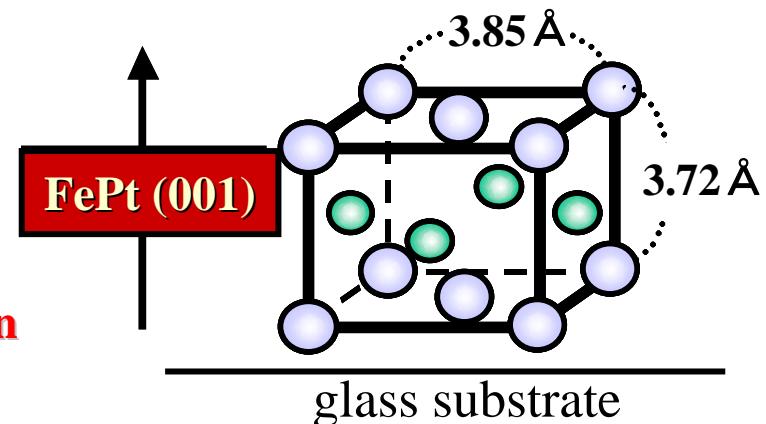
Ordering from Fe(100)/Pt(100) bilayer structure

fcc-Pt(100)/Fe(100)

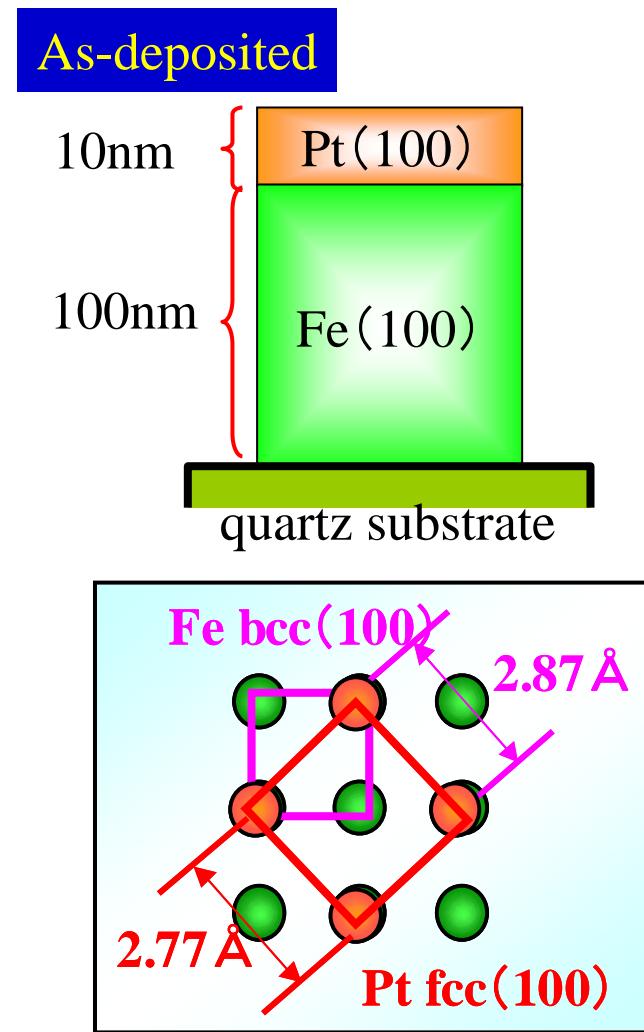
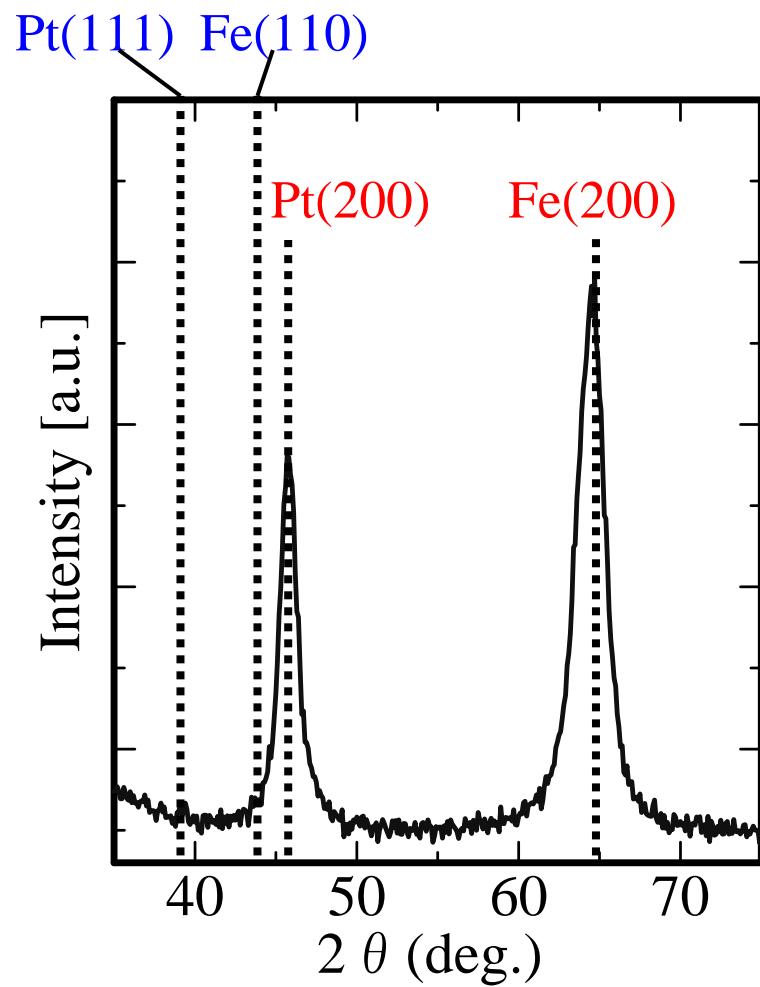
fct-FePt(001)



fcc-Pt (100)
misfit : 3.3 %

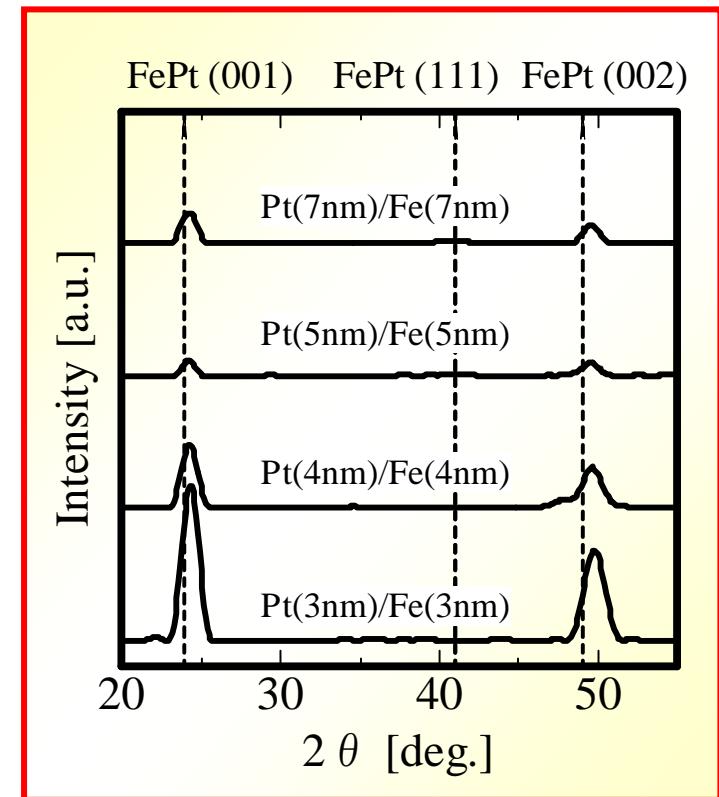
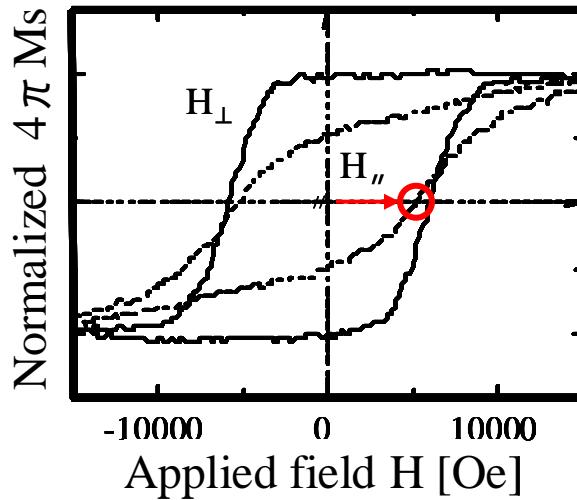
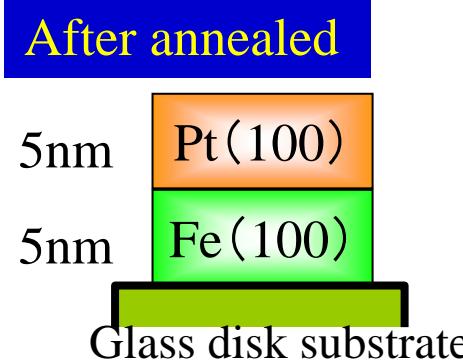
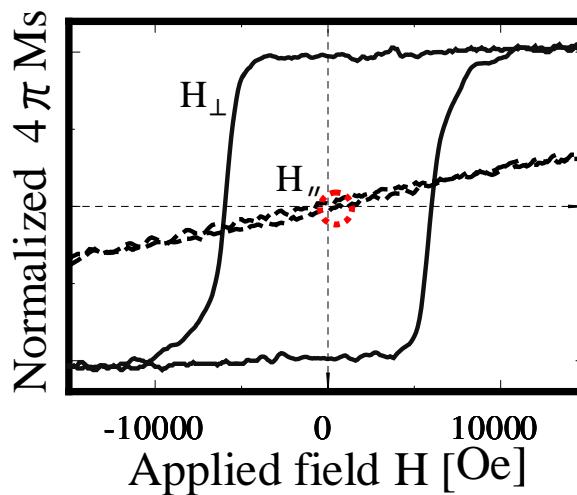
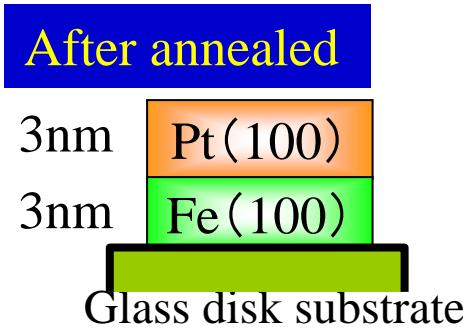


Pt(100)/Fe(100) epitaxial relationship



Epitaxial growth relationship with Fe(100)/Pt(100)

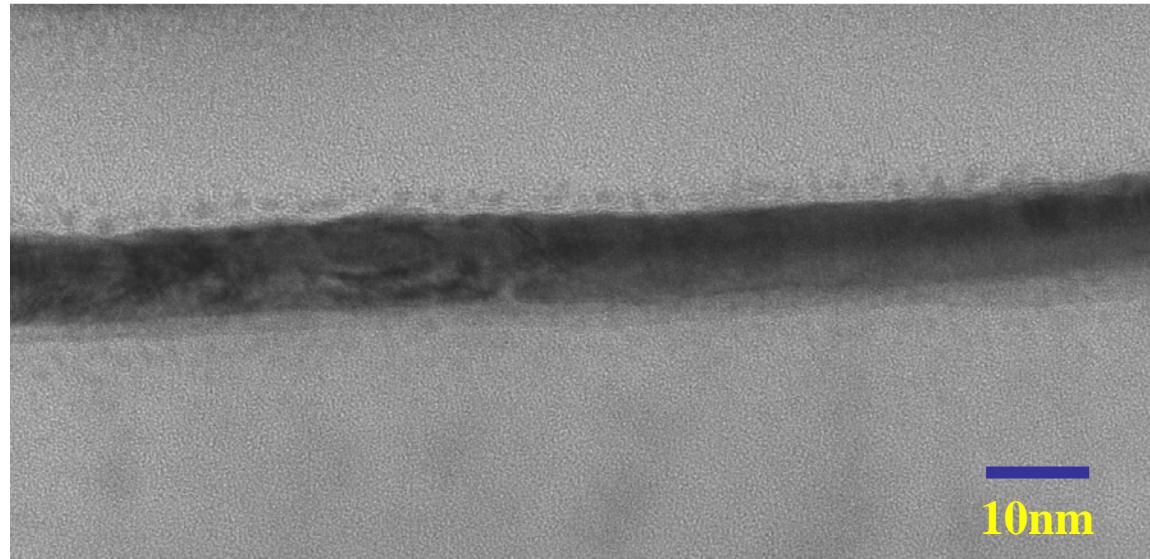
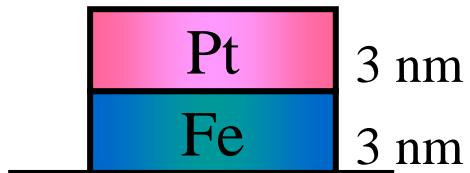
Film thickness-dependence



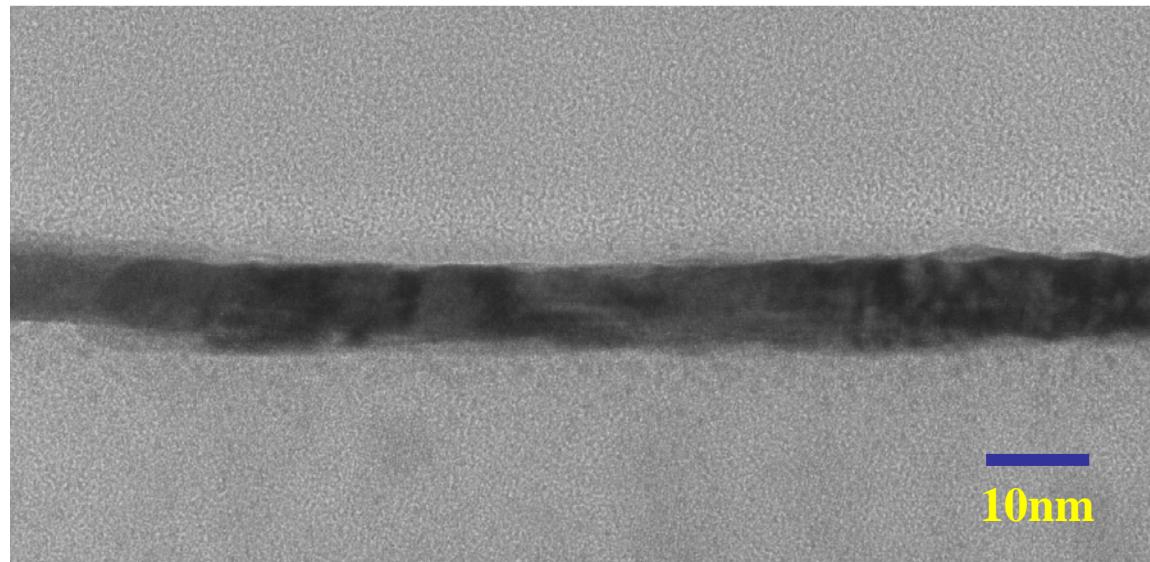
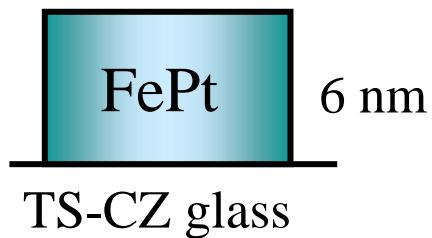
M-H characteristic deteriorates with increase of film thickness

Cross sectional TEM views of bilayers

As-deposited

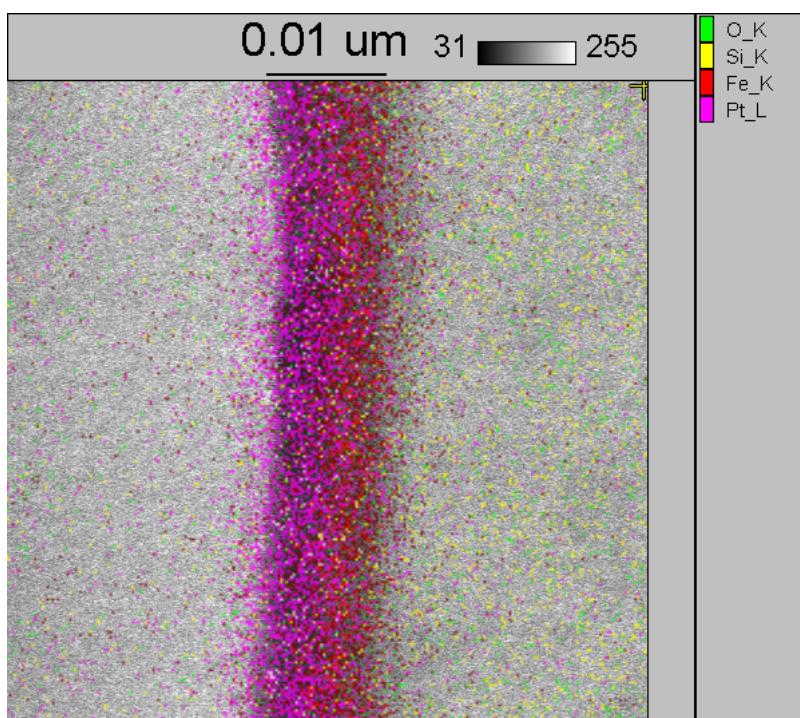
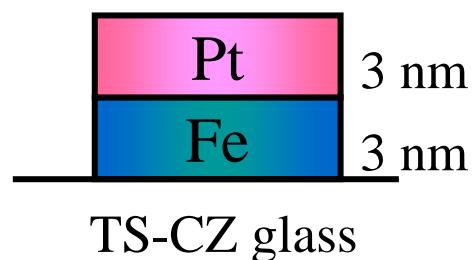


Annealed at 600°C in H₂



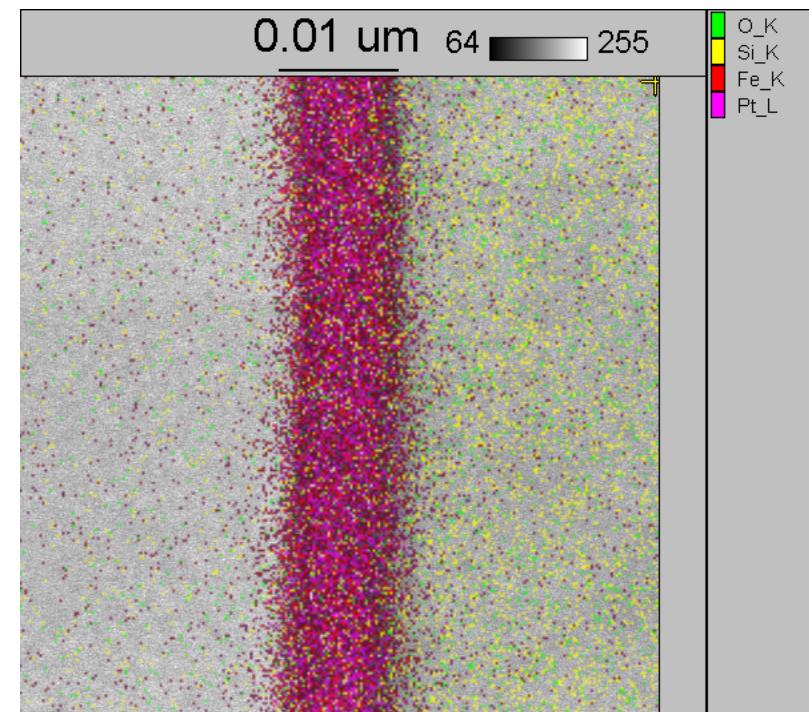
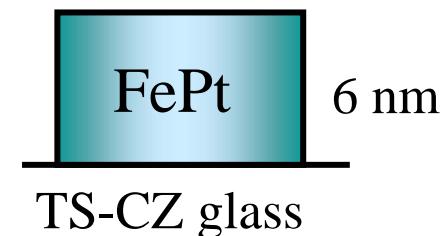
FePt alloyed film by inter-diffusion by post annealing

As-deposited



Pt/Fe bilayer

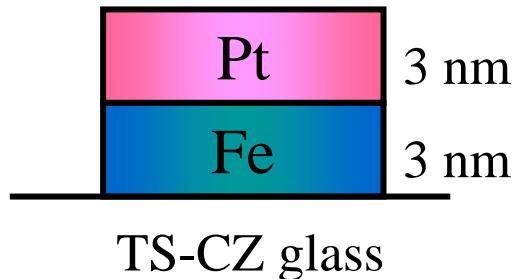
Annealed at 600°C in H₂



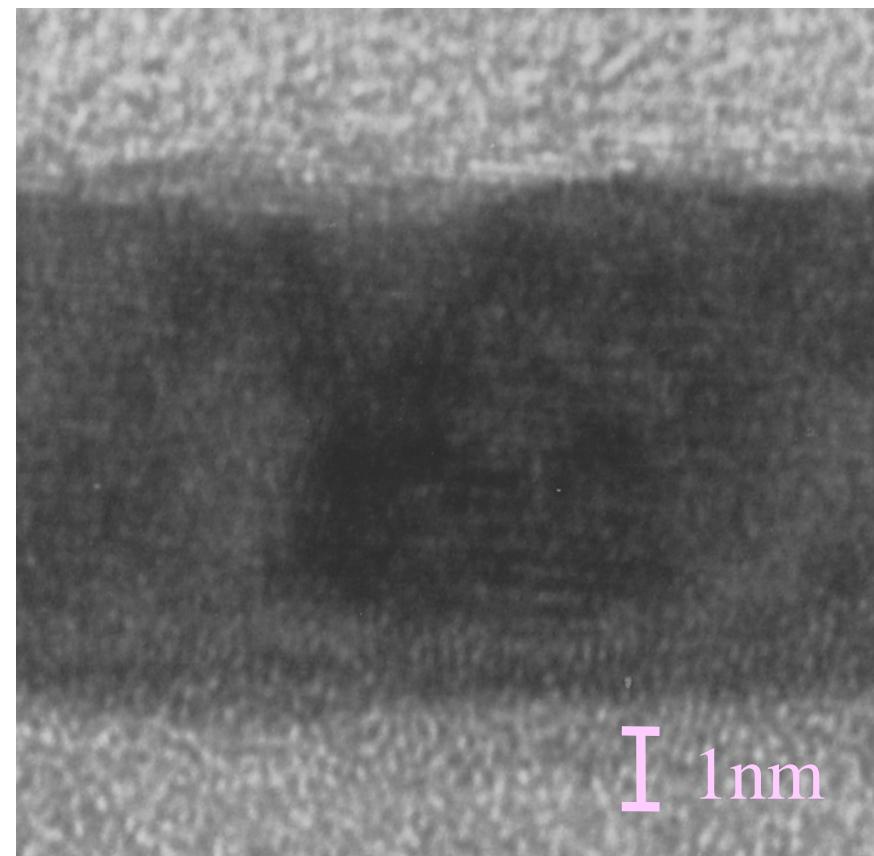
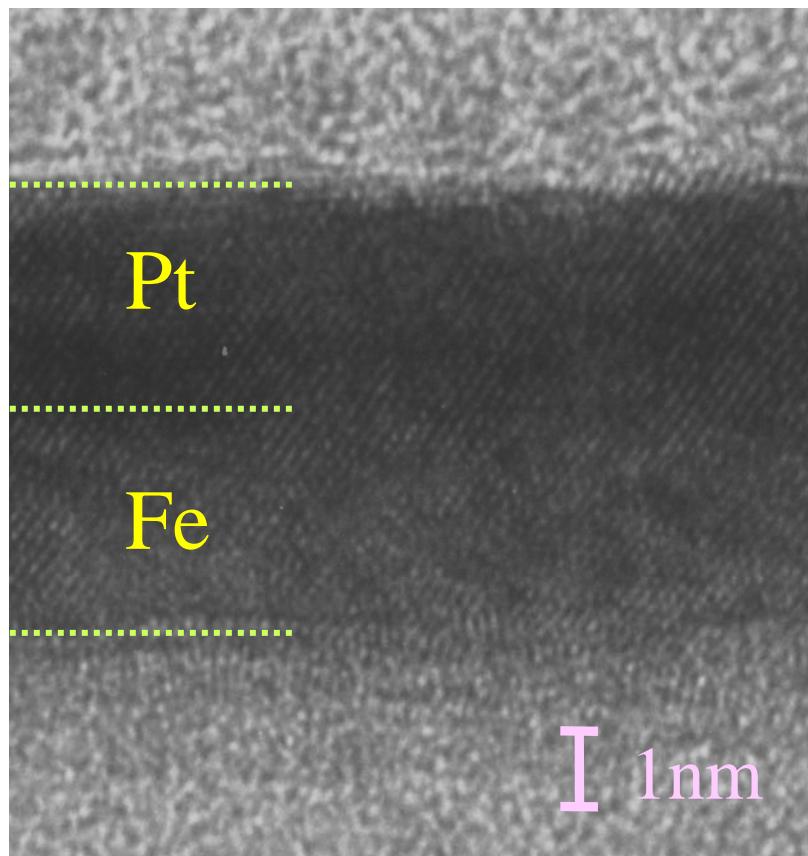
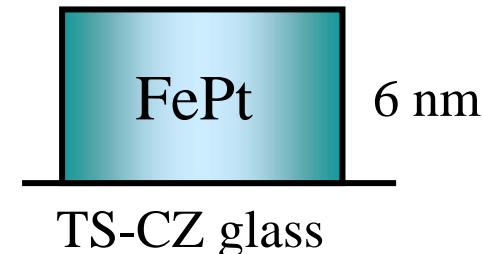
alloyed by inter-diffusion

Cross sectional TEM views of bilayers (enlarged)

As-deposited

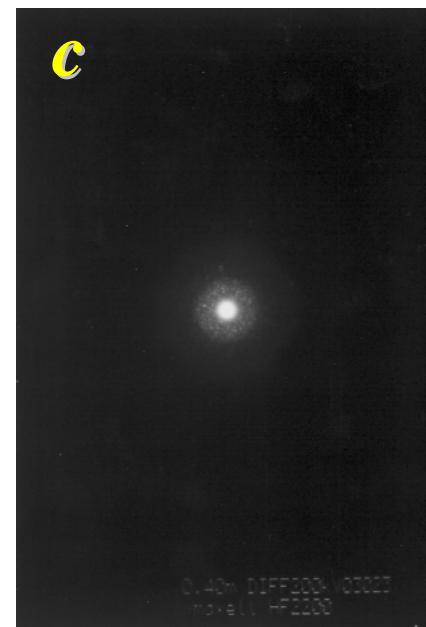
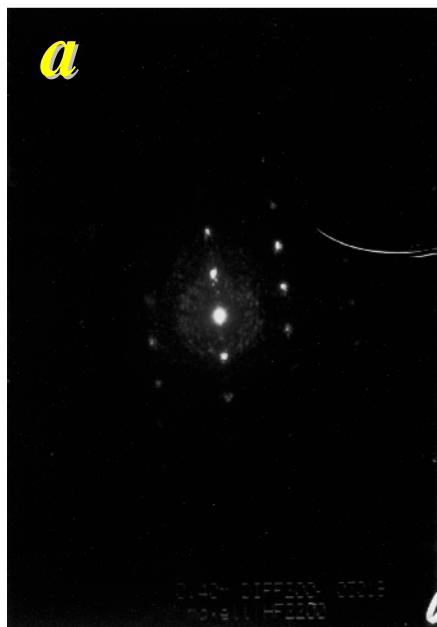
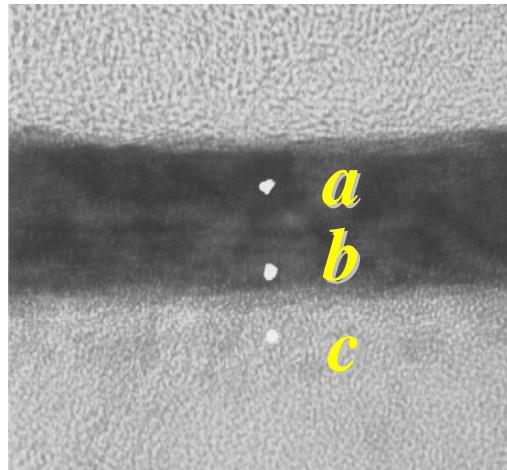
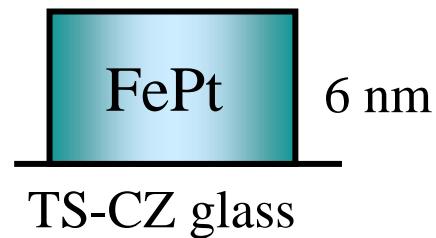


Annealed at 600°C in H₂



Cross sectional ED patterns of bilayer after annealing

Annealed at 600°C in H₂

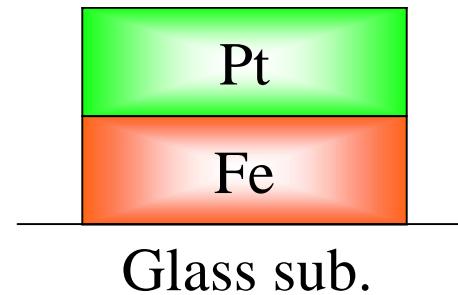


1 Fe/Pt二層膜によるc-軸配向FePt規則合金膜

2 Fe/Pt/X三層膜による第三元素の添加効果

3 異常Hall効果によるFePt合金膜の磁化過程
解析と裏打ち軟磁性層との磁気結合評価

三層膜によるFePtへの第三元素添加



応用上の課題

高キュリー温度 ($450\text{ }^{\circ}\text{C}$)

高規則化温度 ($550\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Cu

Au

キュリー点制御

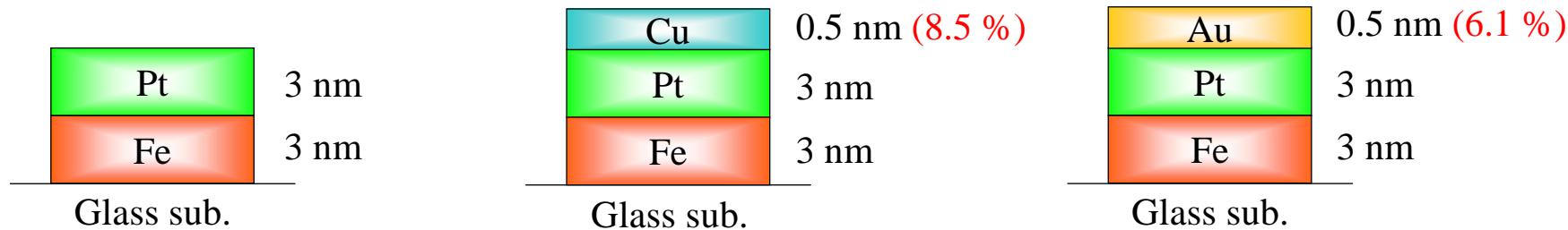
規則化促進効果

熱アシスト磁気記録媒体用

$L1_0$ -FePtの低温形成

Purpose

第三元素添加による特性制御



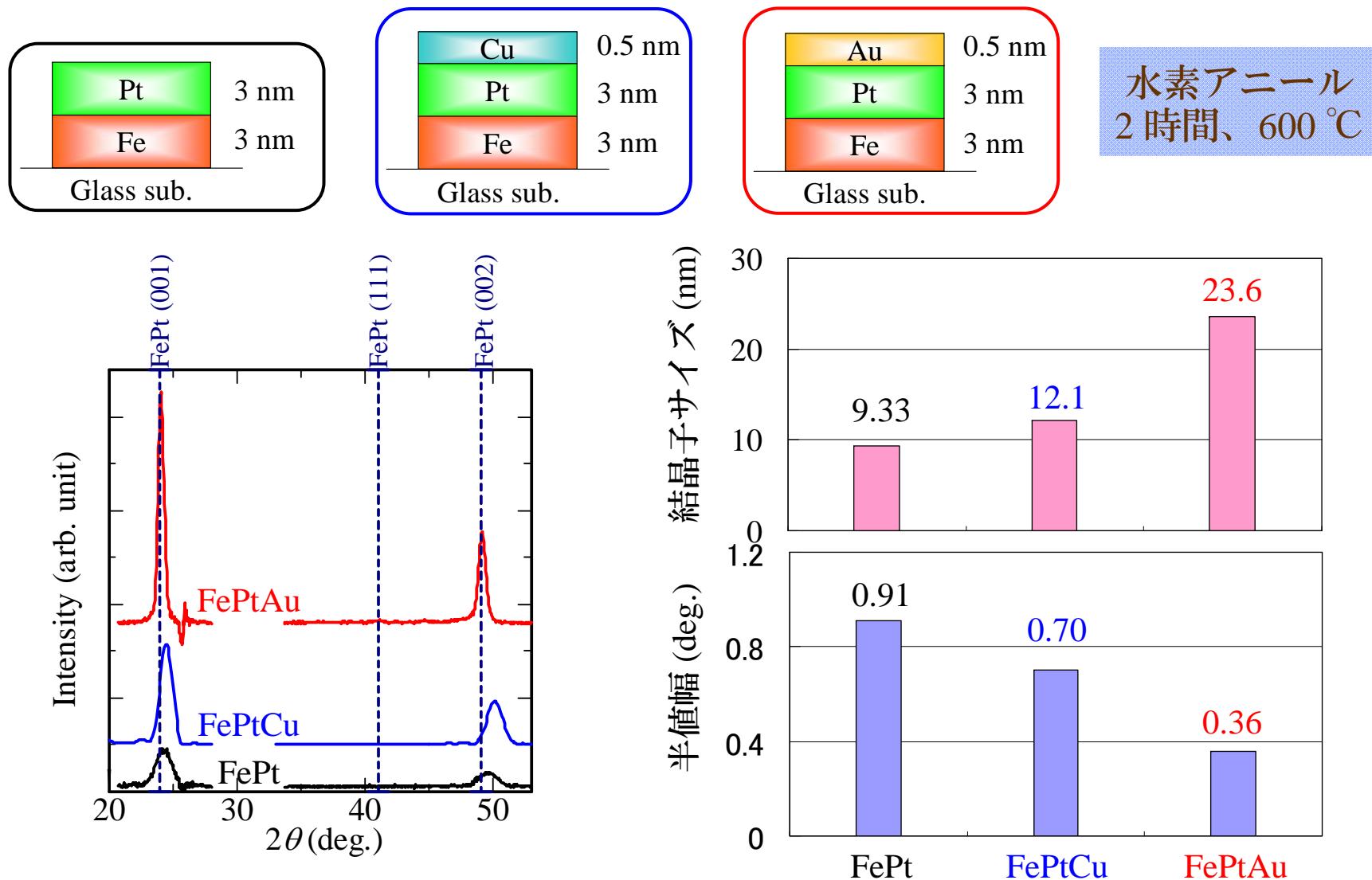
▶ 基板 結晶化ガラス基板 (OHARA : TSCZ)

▶ 試料堆積速度 0.5 nm/min

▶ スパッタリングガス Ar 0.4 mTorr

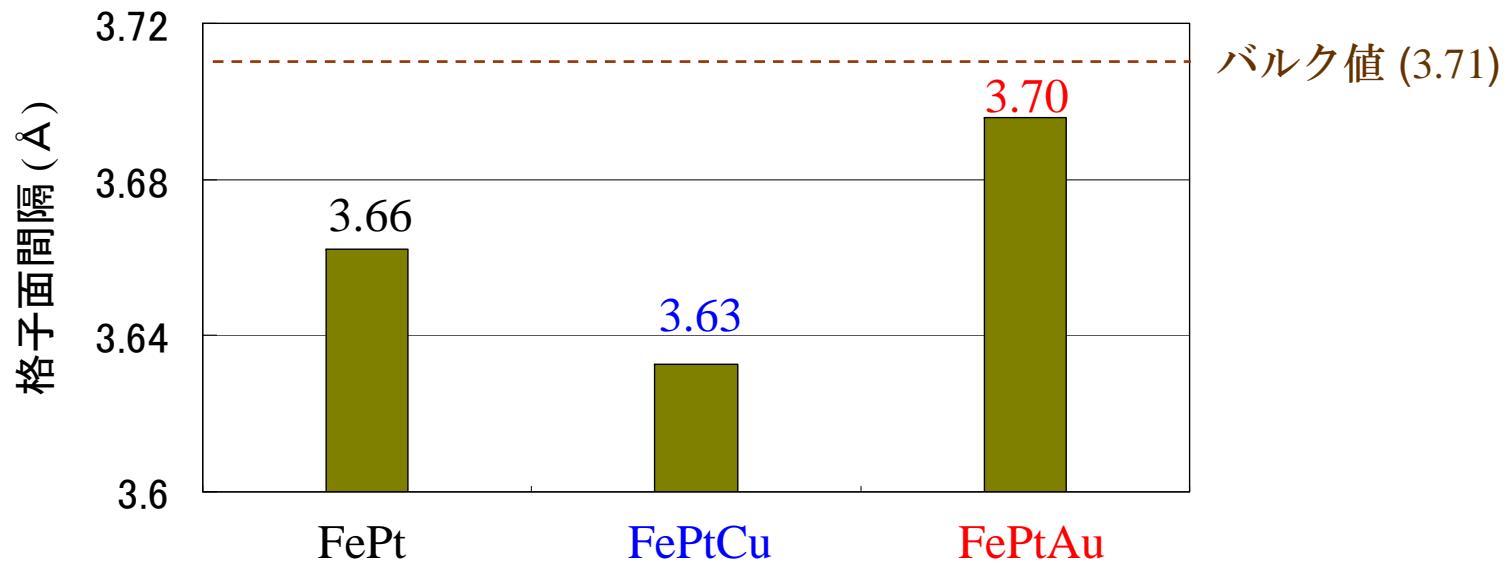
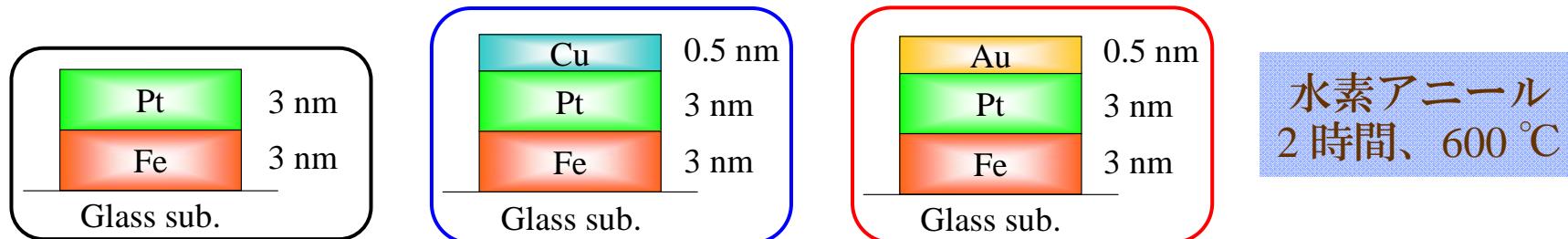
▶ 水素アニール 2時間、600 °C

X線回折図(600 °Cアニール)



第三元素添加膜は非常に高いFePt(001)積分強度

FePt(001)面の格子面間隔



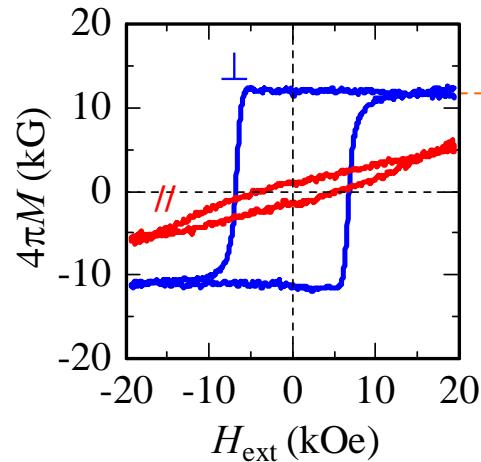
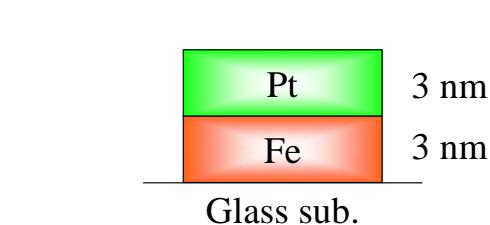
FePt : c 軸方向への圧縮応力

FePtCu : CuがFeと置換することにより c 軸方向へ圧縮

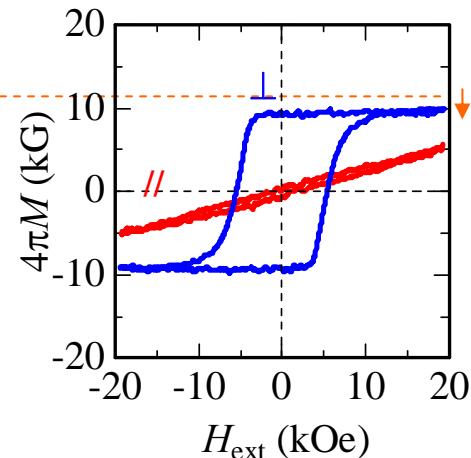
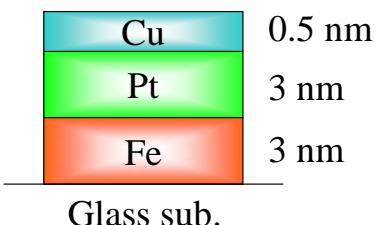
FePtAu : 圧縮応力の解放

M-Hカーブ(600 °Cアニール)

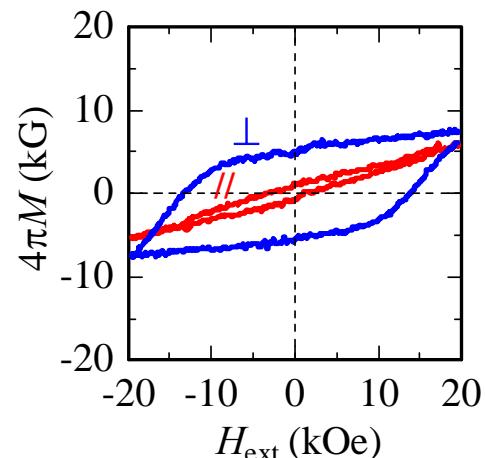
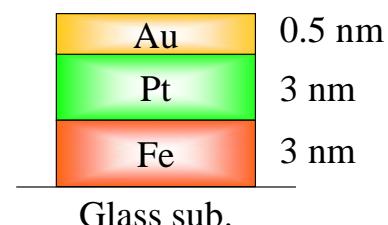
水素アニール
2時間、600 °C



$$H_c : 6.8 \text{ (kOe)}$$



$$H_c : 5.4 \text{ (kOe)}$$

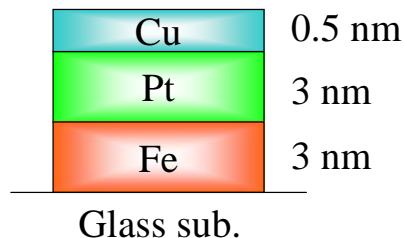


$$H_c : 13.6 \text{ (kOe)}$$

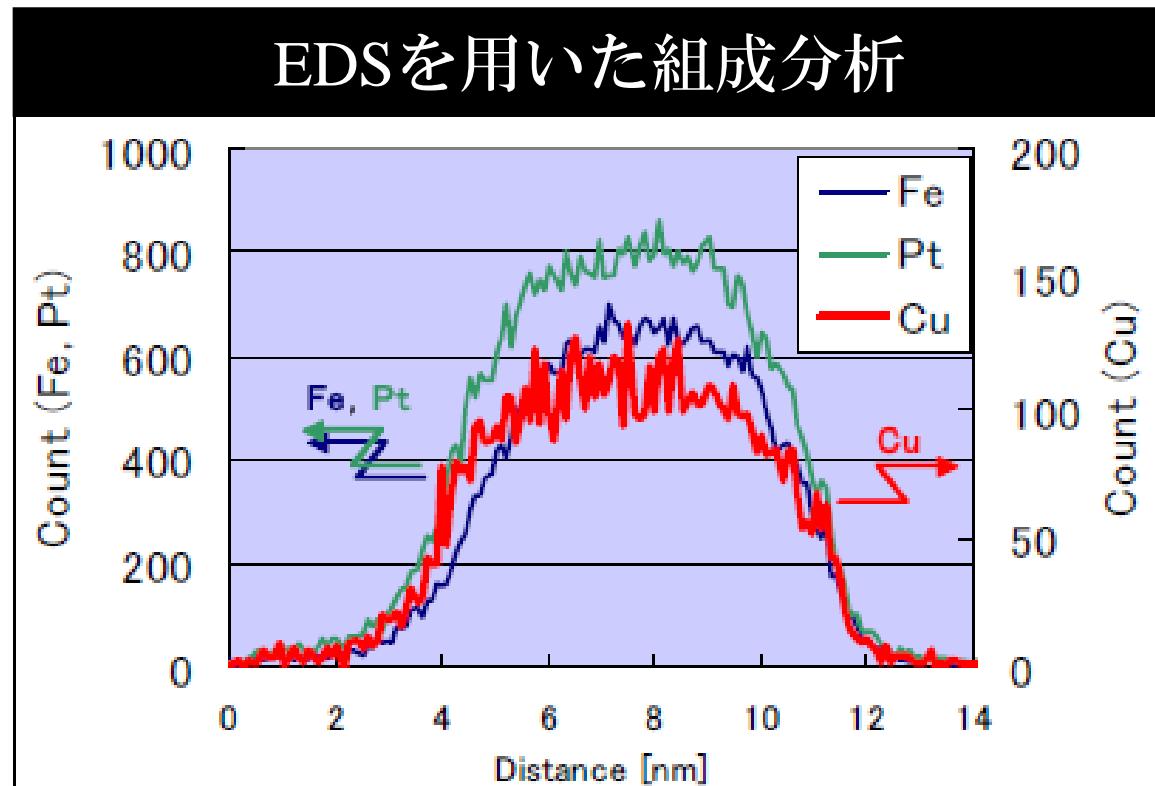
FePtCuの飽和磁化が減少

FePtAuの垂直保磁力が増加

FePtCuの膜厚方向における組成分布



水素アニール
2時間、600 °C



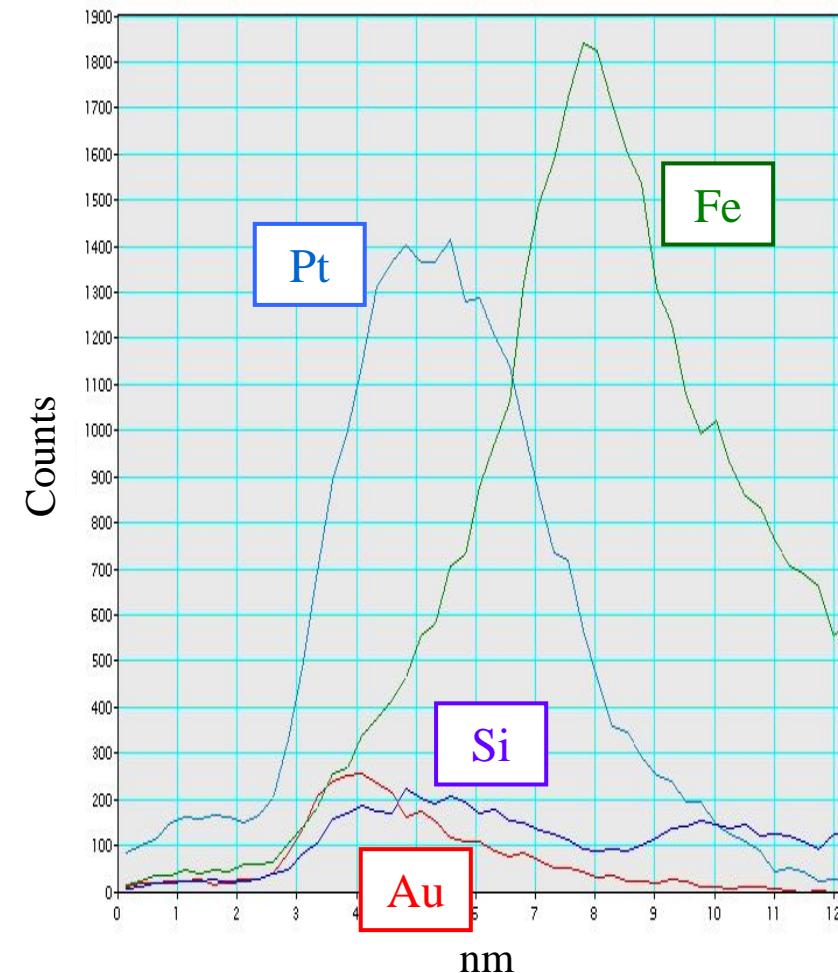
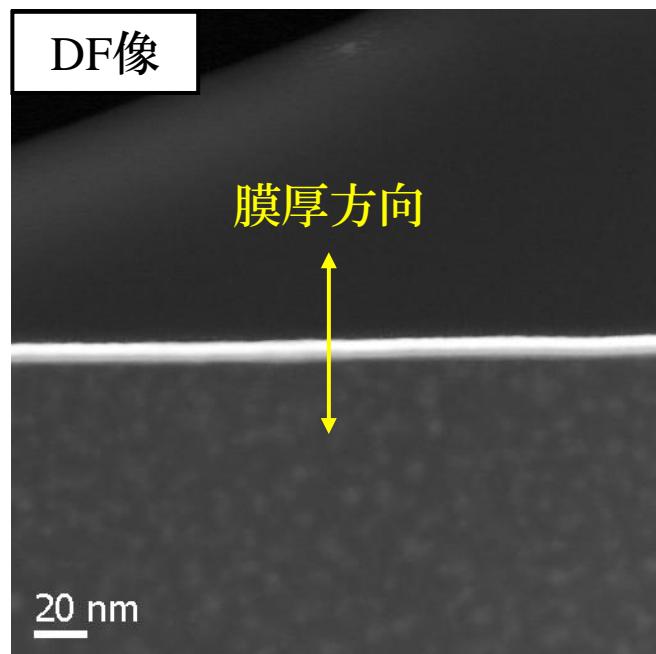
基板 ← → 試料表面

Cu が膜全体で均一に拡散

FePtAuの膜厚方向の組成分布(アニール前)

Au	0.5 nm
Pt	3 nm
Fe	3 nm
Glass sub.	

アニール前
膜厚方向



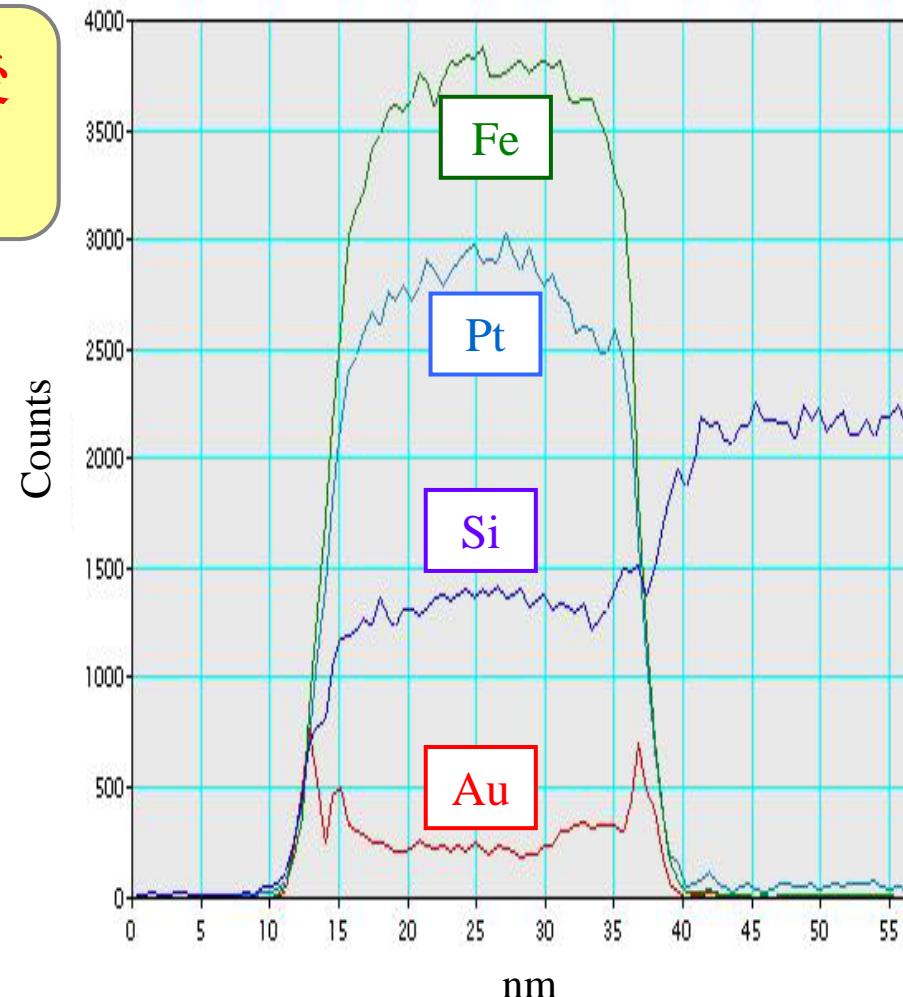
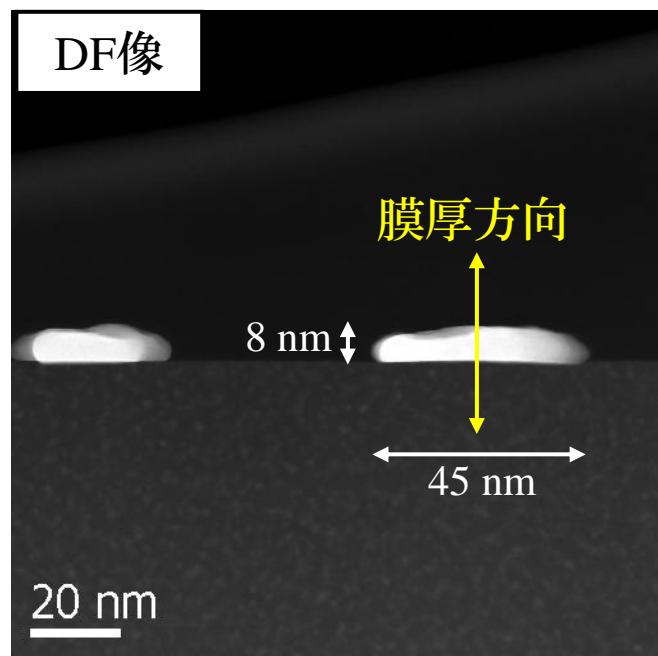
試料表面 ← → 基板

EDS組成分布より予想通りの膜構成

FePtAuの膜厚方向の組成分布(アニール後)

Au	0.5 nm
Pt	3 nm
Fe	3 nm
Glass sub.	

アニール後
膜厚方向



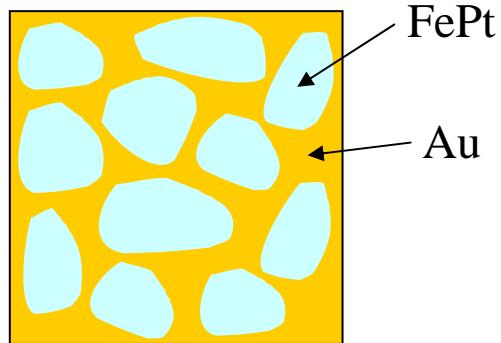
試料表面 ← → 基板

膜が島状に凝集(膜厚増加)

Auが膜の上下に偏析
Siも膜中に拡散

Au添加時の保磁力増加メカニズム

AuはFePtの格子に入り込みます
マトリックス構造をとる



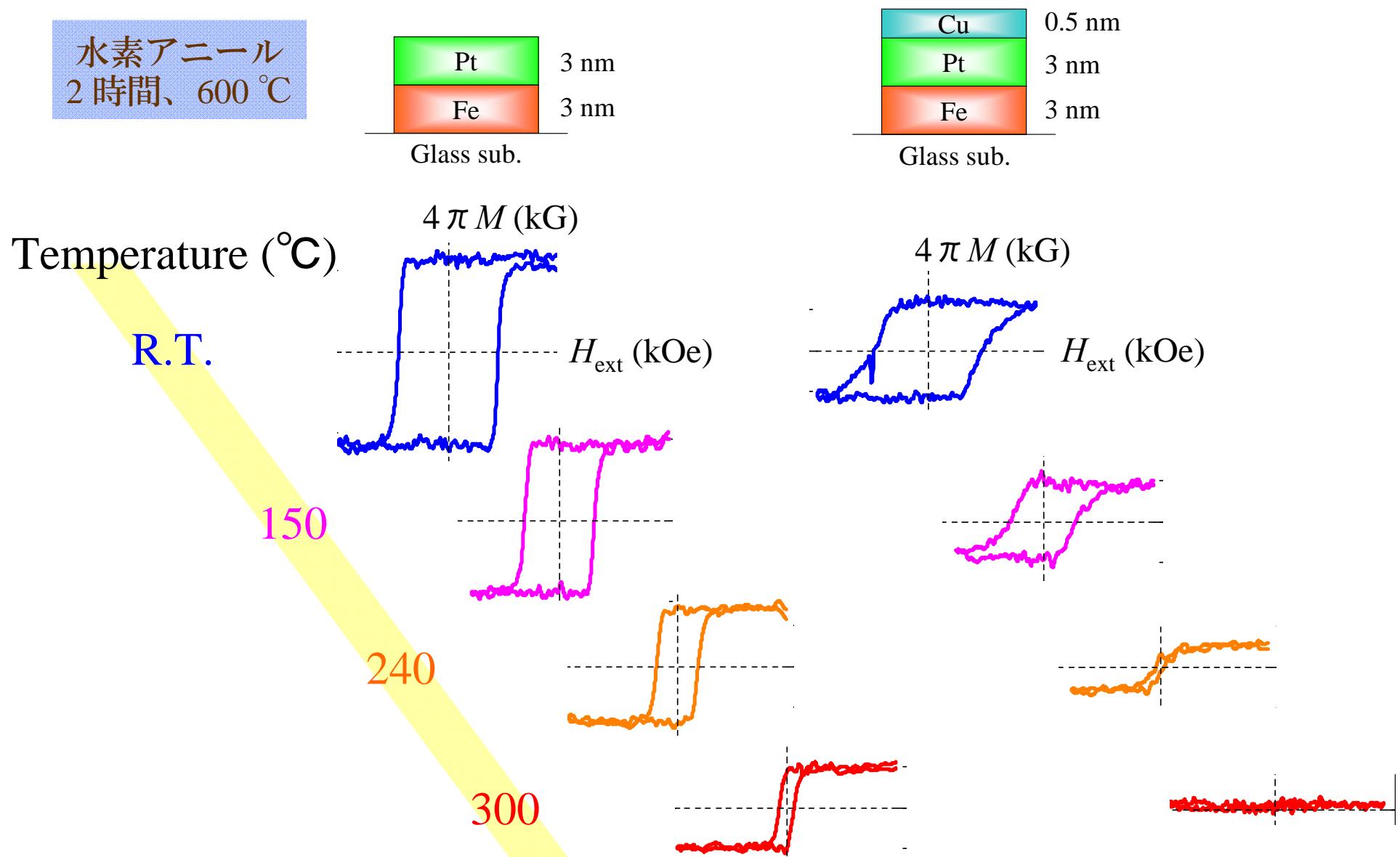
- AuはFeとPtに対して非固溶
- 粒界への析出は磁壁の
ピン止め作用がある

非磁性のAuによってFePtが粒分離される

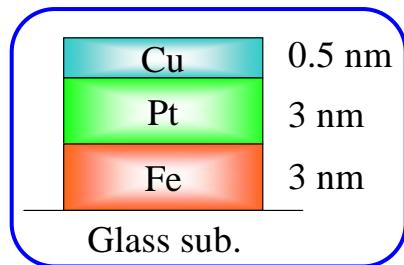
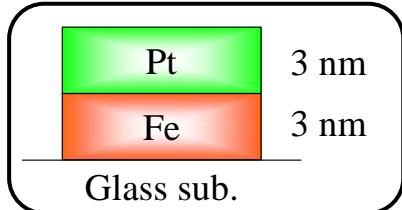


微粒子性磁化反転機構による保磁力の増大？

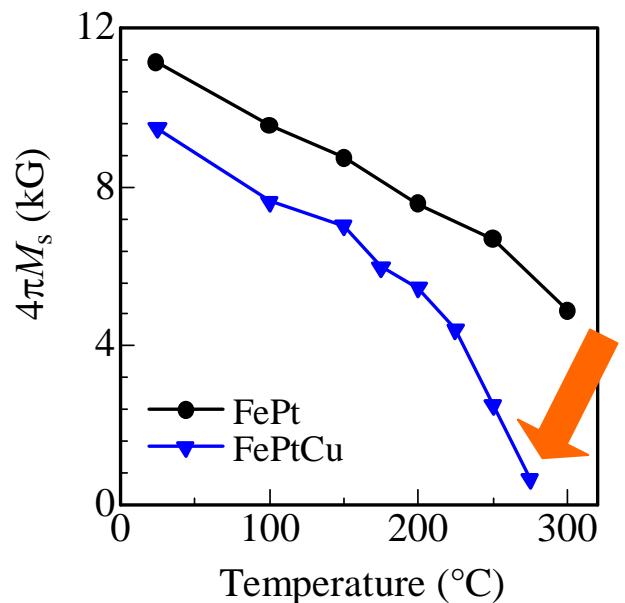
温度に対する磁気特性



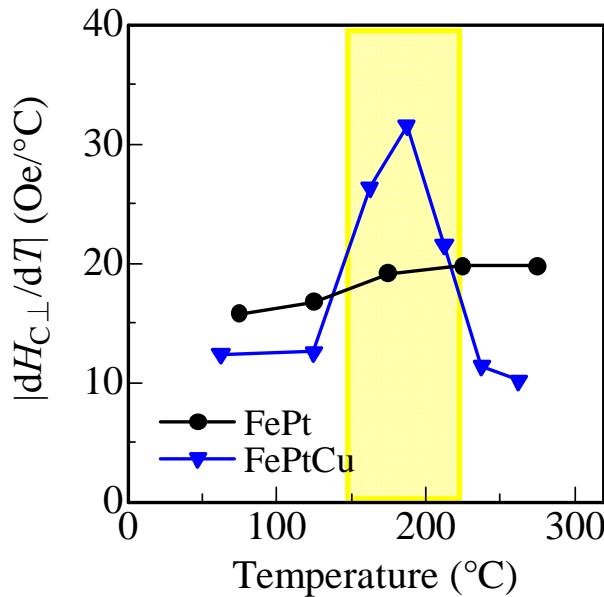
温度に対する磁気特性



水素アニール
2時間、600 °C

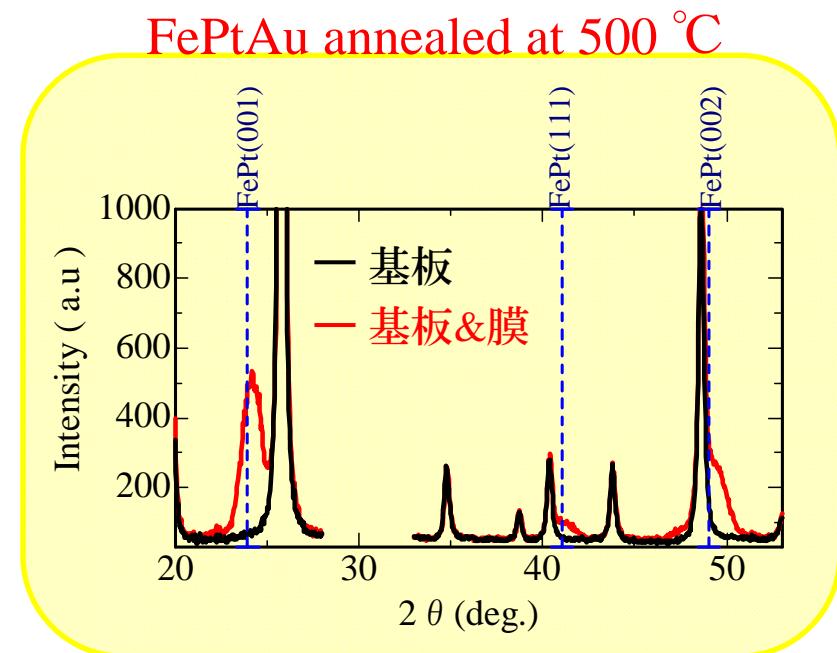
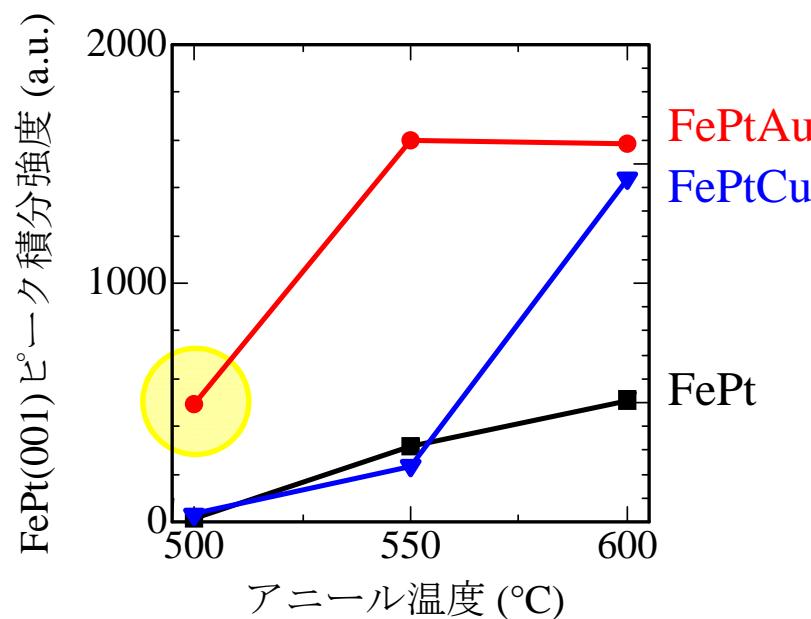
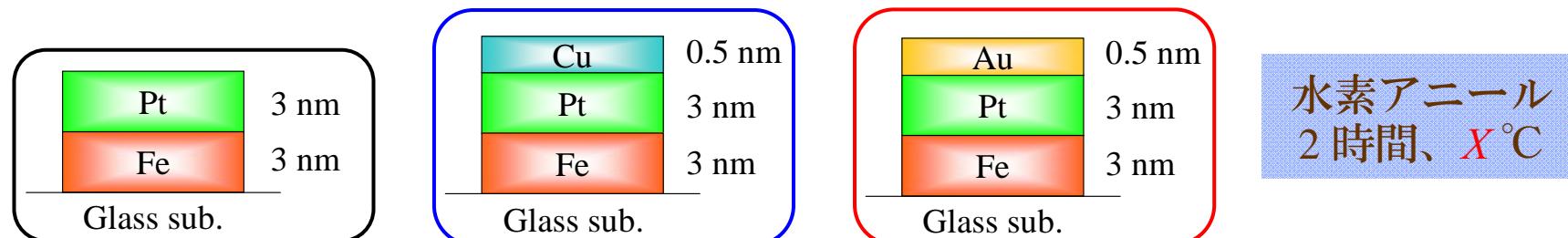


キュリー温度の減少



200 °C付近における
急峻な温度変化

FePt(001)ピーク積分強度(アニール温度変化)



Au添加膜において規則化温度を500 °Cに下げることに成功

アニール温度変化時のFePtAuのAFM画像

Au	0.5 nm
Pt	3 nm
Fe	3 nm
Glass sub.	

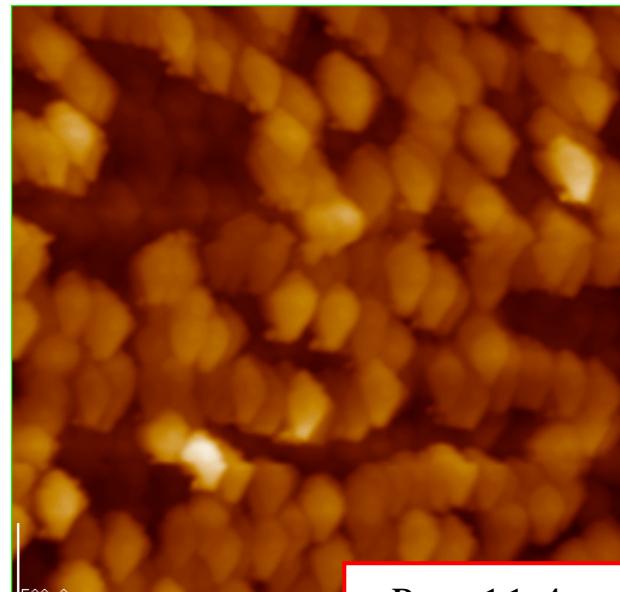
水素アニール
2時間、 $X^{\circ}\text{C}$

スケール

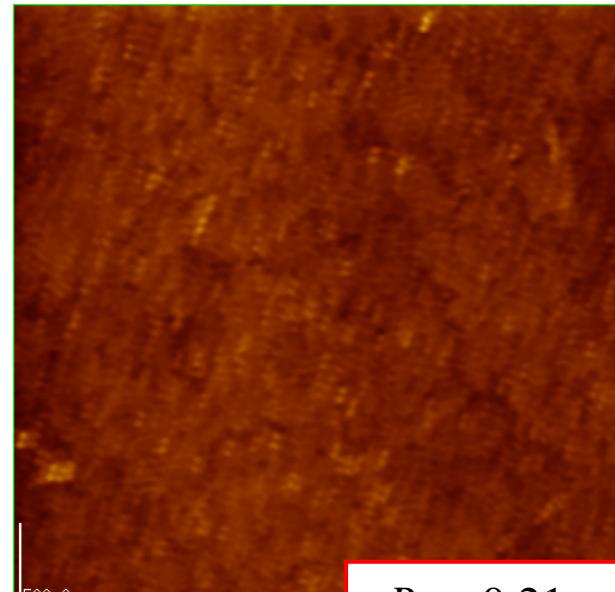
$3.5 \times 3.5 \mu\text{m}$

600 $^{\circ}\text{C}$

500 $^{\circ}\text{C}$



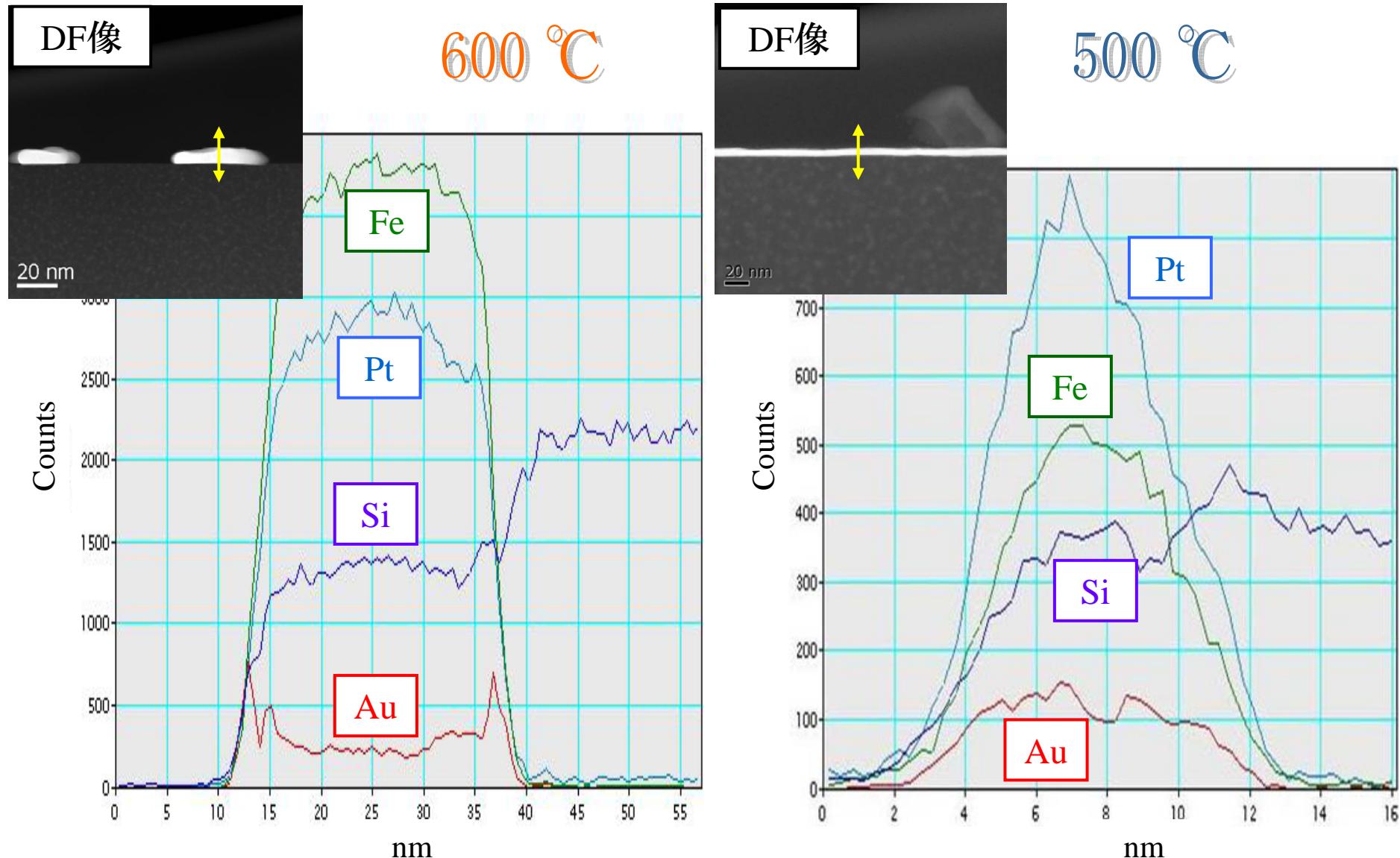
$R_a = 11.4 \text{ nm}$



$R_a = 0.21 \text{ nm}$

500 $^{\circ}\text{C}$ アニール時において表面粗さが激減

アニール温度変化時のFePtAuの膜厚方向の組成分布



$500\text{ }^{\circ}\text{C}$ においては島状構造やAuの膜上下への偏析は見られない



Fe/Pt/X三層膜による第三元素の添加効果を確認

- ▶ 第三元素を添加した膜のFePt(001)ピーク積分強度が増加
- ▶ FePtAuにおいて23.6 nmという結晶子サイズを実現
- ▶ Au添加膜の垂直保磁力は他の2つの膜に比べて増加
- ▶ Cu添加によりキュリー温度の低減と急峻な熱応答性を実現



アニール温度変化時のFePtXの特性変化

- ▶ Au添加により規則化温度を500 °Cに低減させることに成功
- ▶ アニール温度を500 °Cに下げることにより R_a 低減を実現

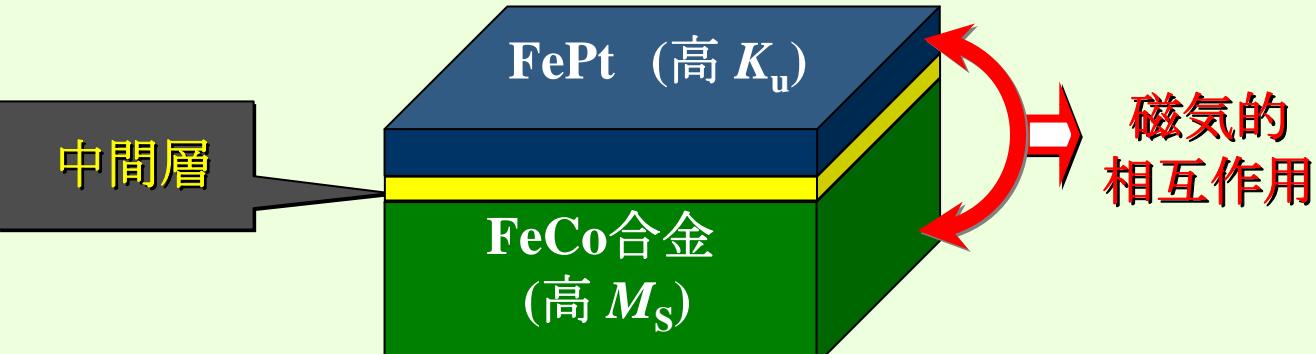
1 Fe/Pt二層膜によるc-軸配向FePt規則合金膜

2 Fe/Pt/X三層膜による第三元素の添加効果

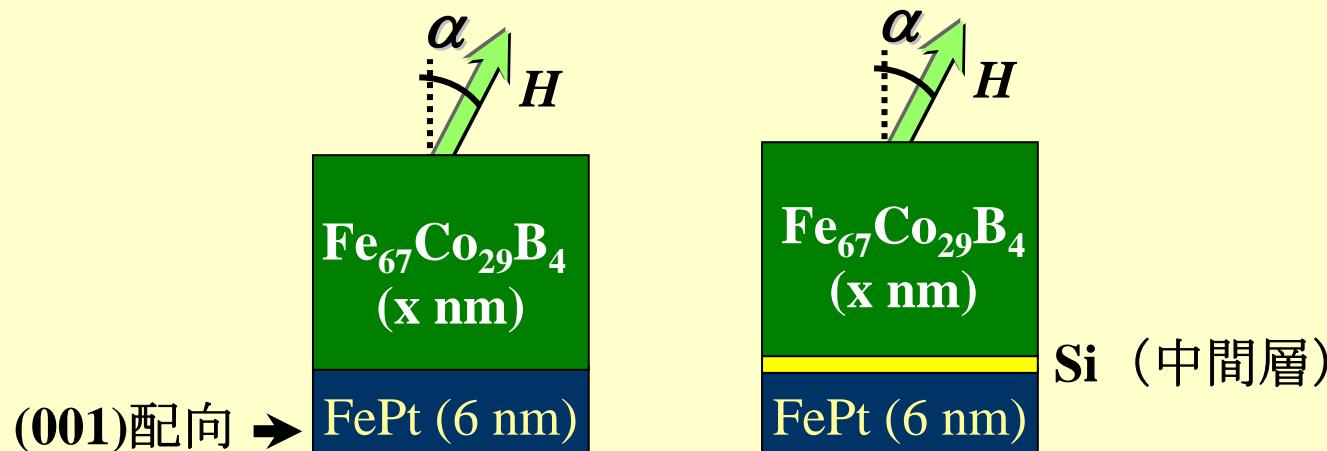
3 異常Hall効果によるFePt合金膜の磁化過程
解析と裏打ち軟磁性層との磁気結合評価

層間の磁気的相互作用評価

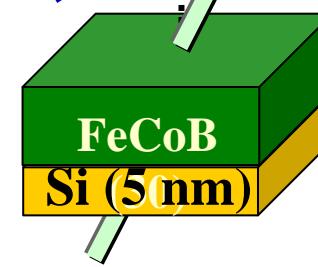
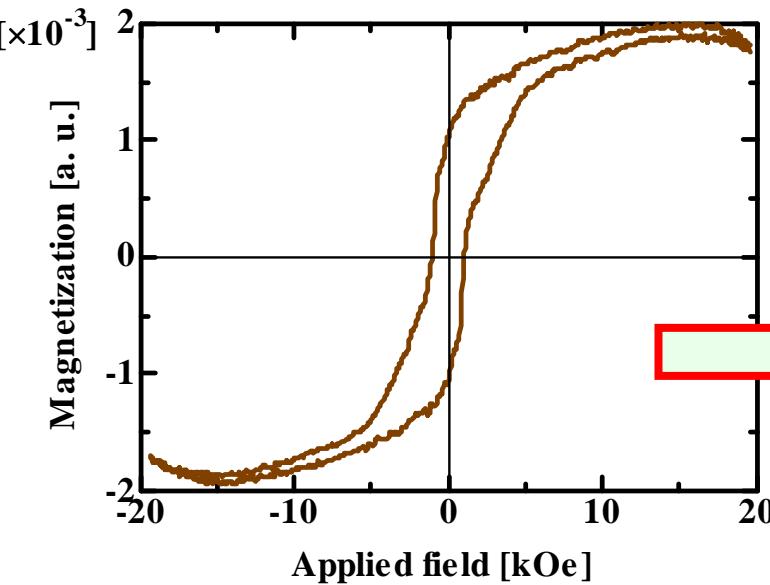
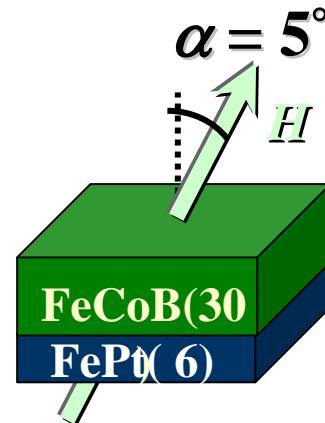
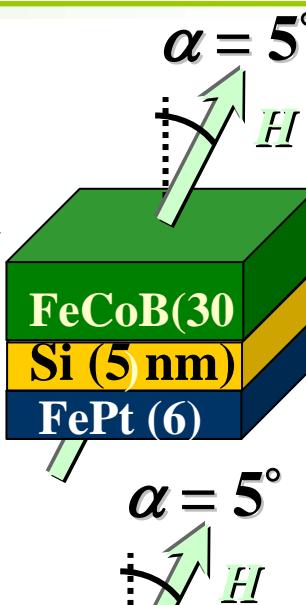
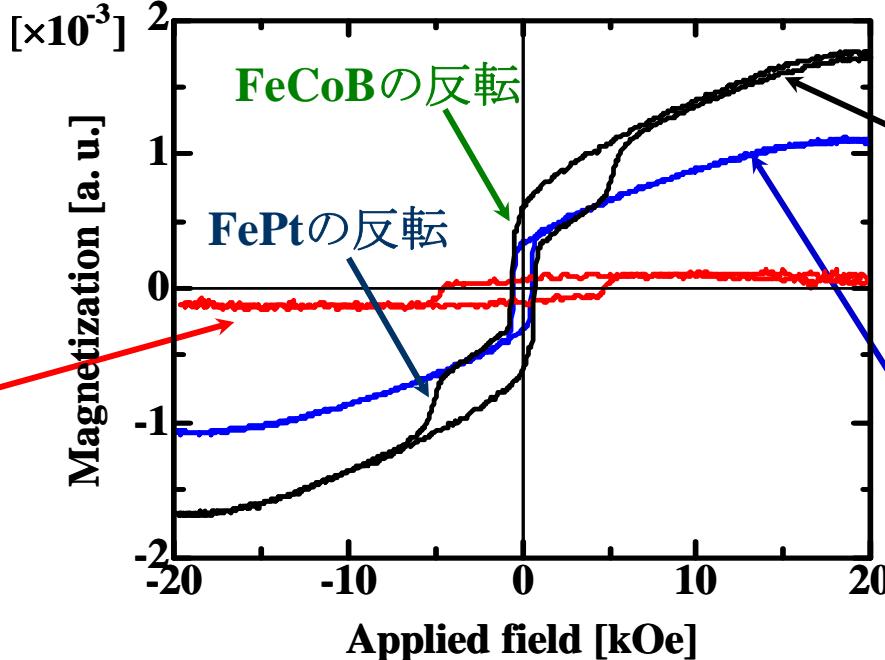
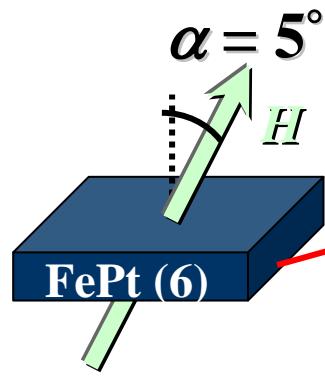
次世代二層膜垂直磁気記録&HAMR媒体



軟磁性層付与によるスイッチング磁界制御の基礎実験

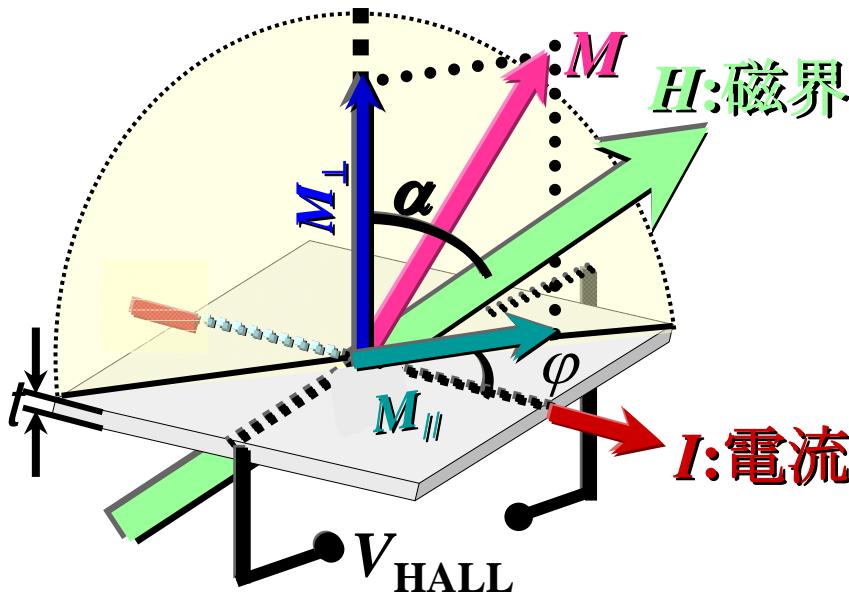


FeCoB層からFePt層への影響(VSMによる評価)



各層の磁化反転
評価困難

強磁性薄膜のホール効果



$$V_{\text{HALL}} = R_{\text{AHE}} \frac{IM_{\perp}}{t} + R_{\text{PHE}} \frac{I(M_{\parallel})^2 \sin(2\phi)}{t}$$

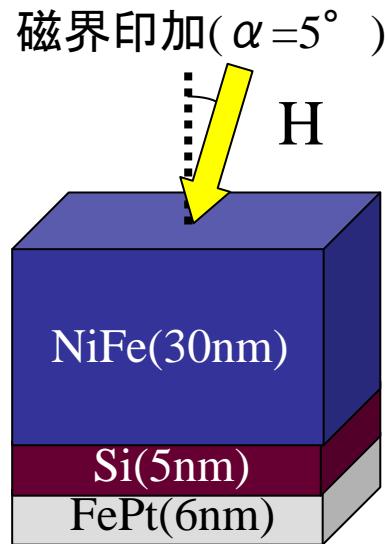
異常ホール電圧 (V_{AHE}) 面内ホール電圧 (V_{PHE})

膜厚に反比例



極薄膜測定に有効

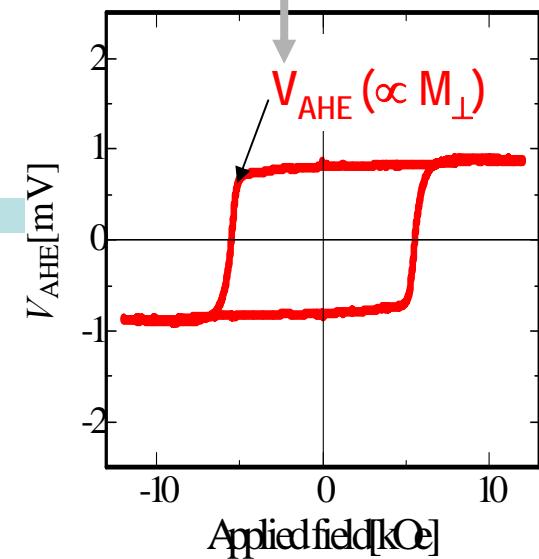
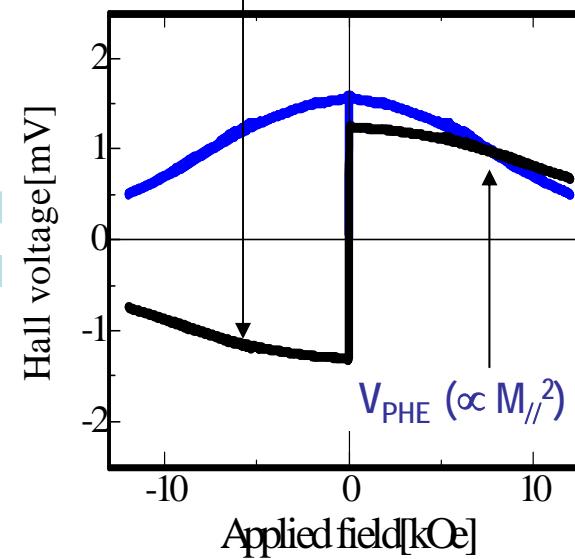
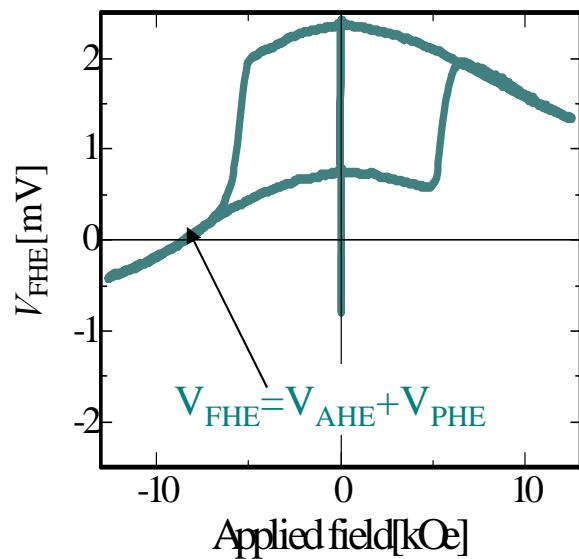
強磁性Hall効果による軟磁性層の特性の抽出



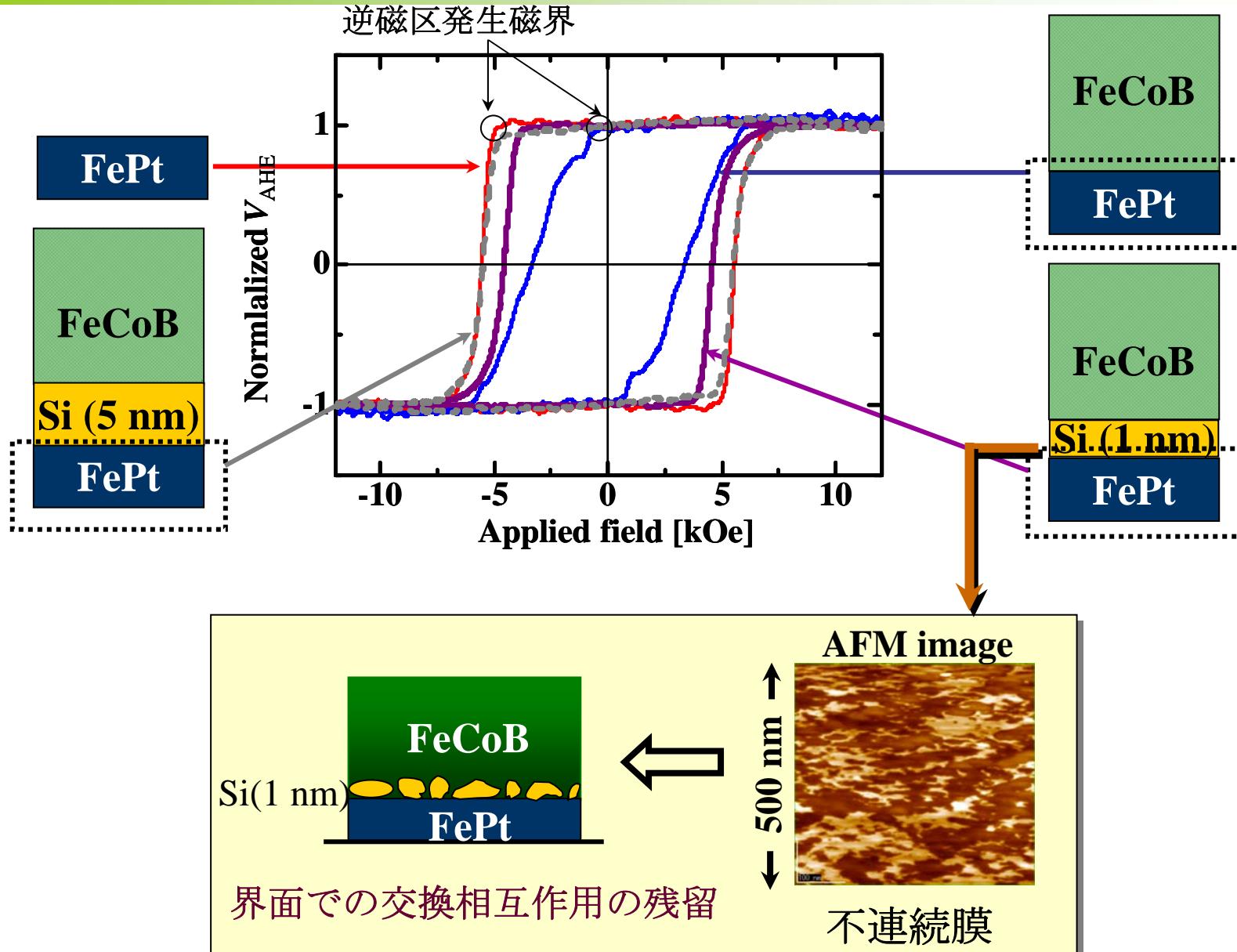
軟磁性層の特性

NiFeからの
信号が支配的

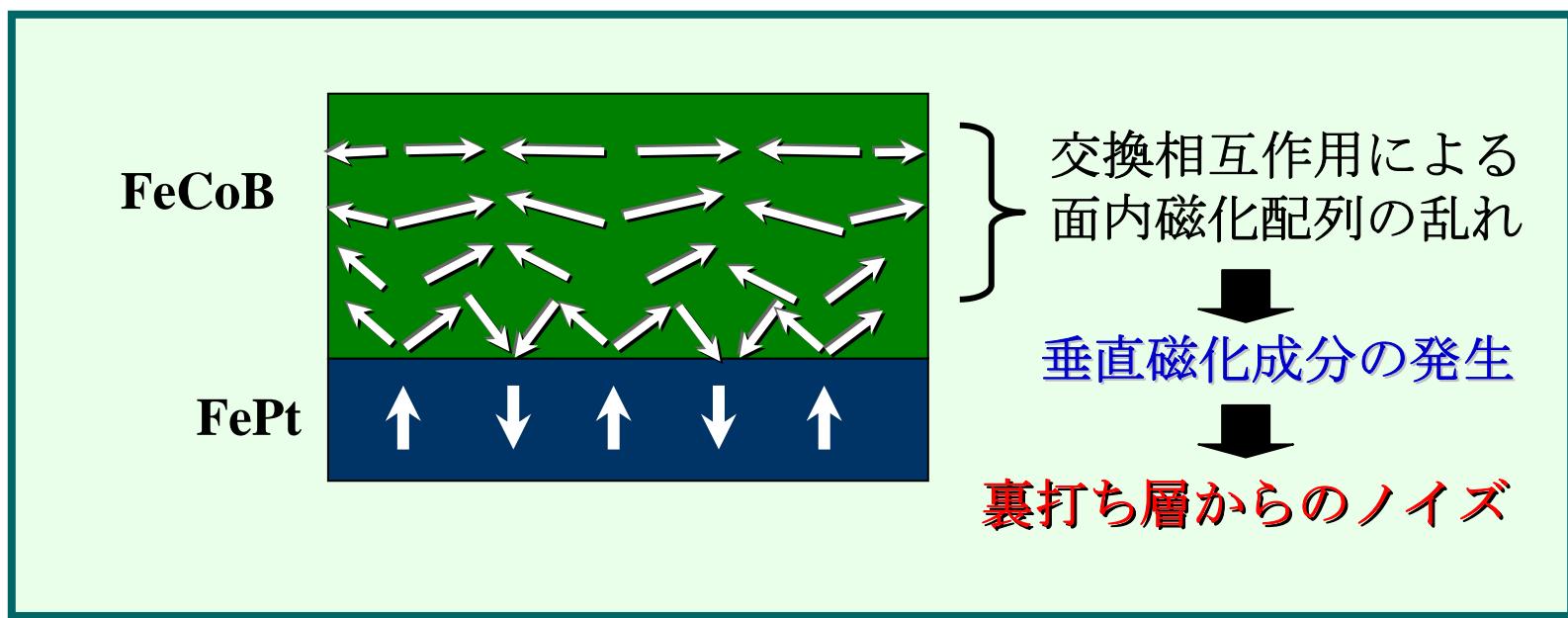
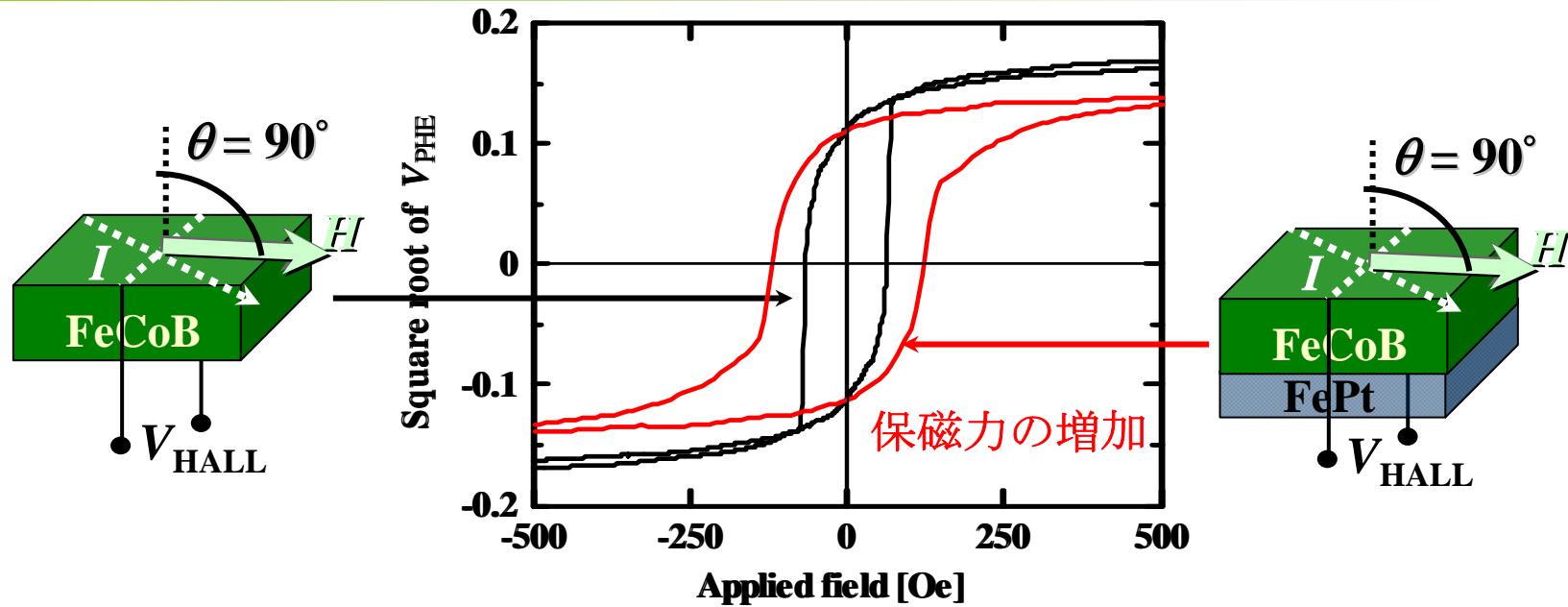
FePtからの
信号が支配的



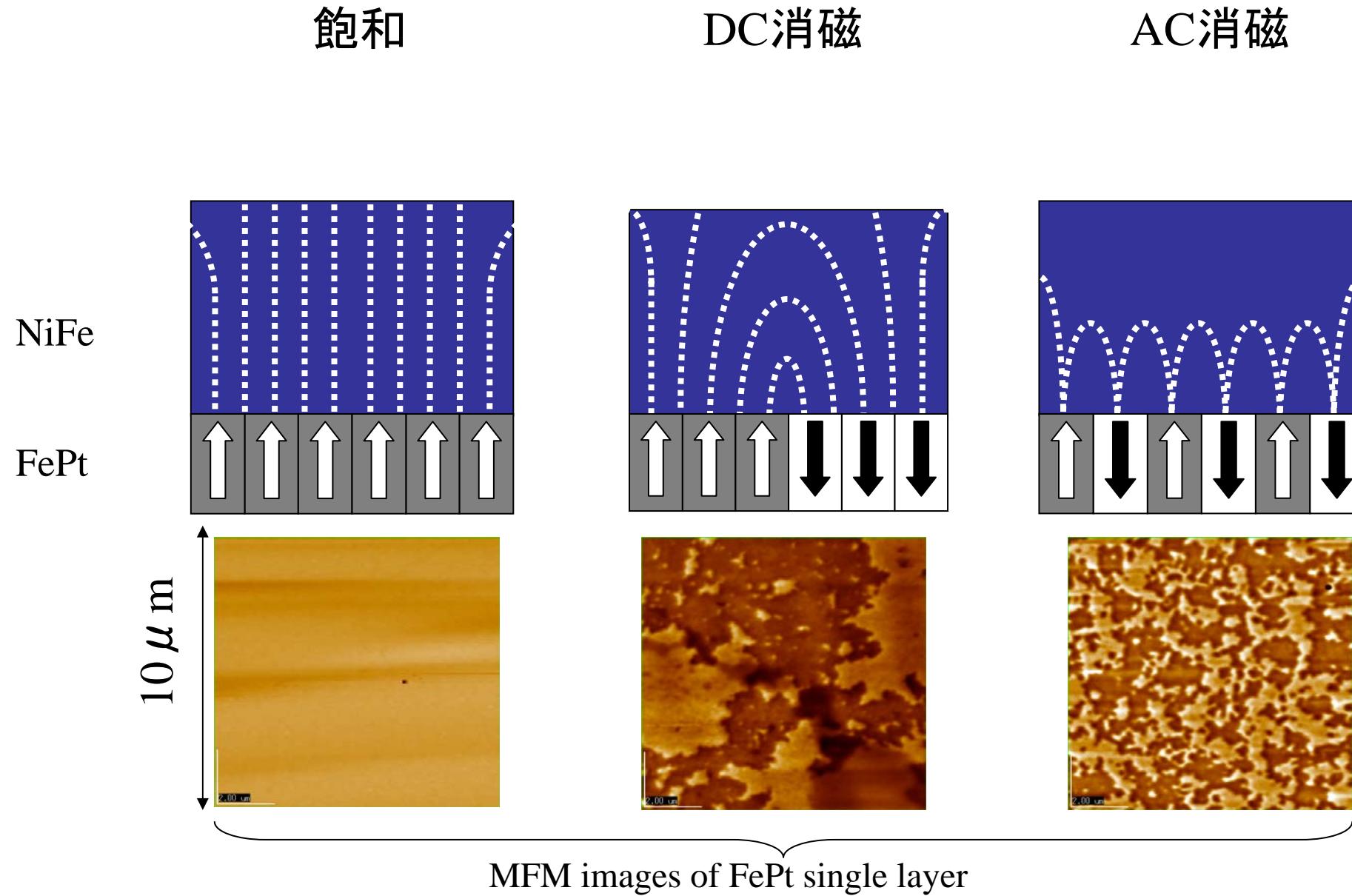
FeCoB層からFePt層への影響



FePt層からFeCoB層への影響

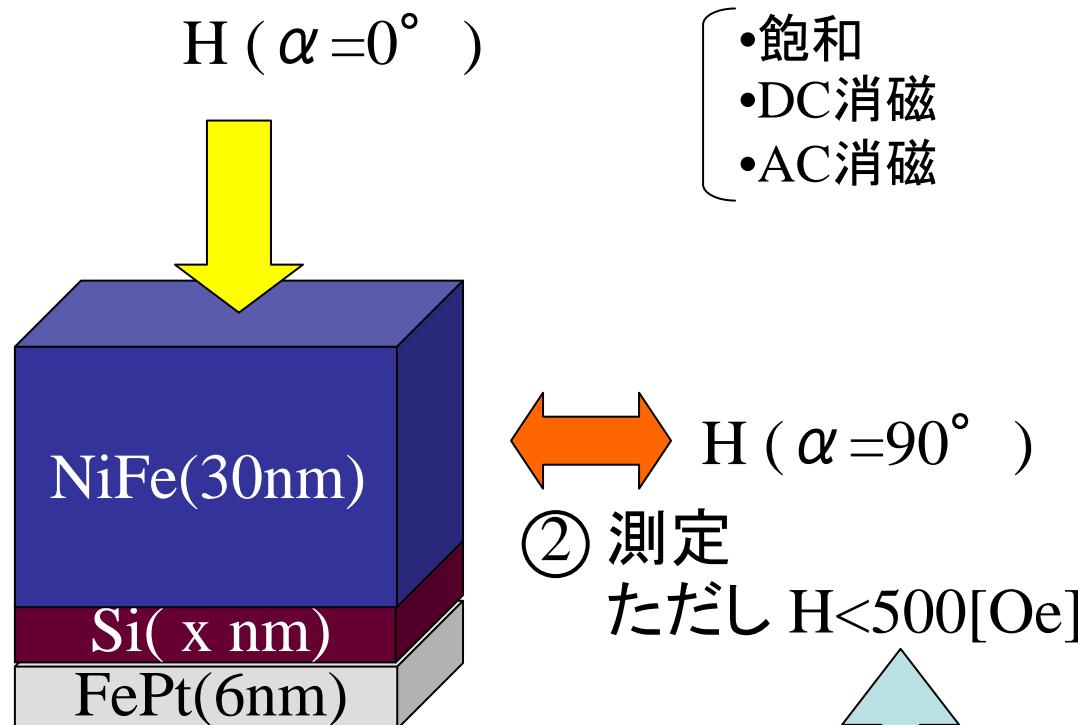


FePtの残留磁化状態



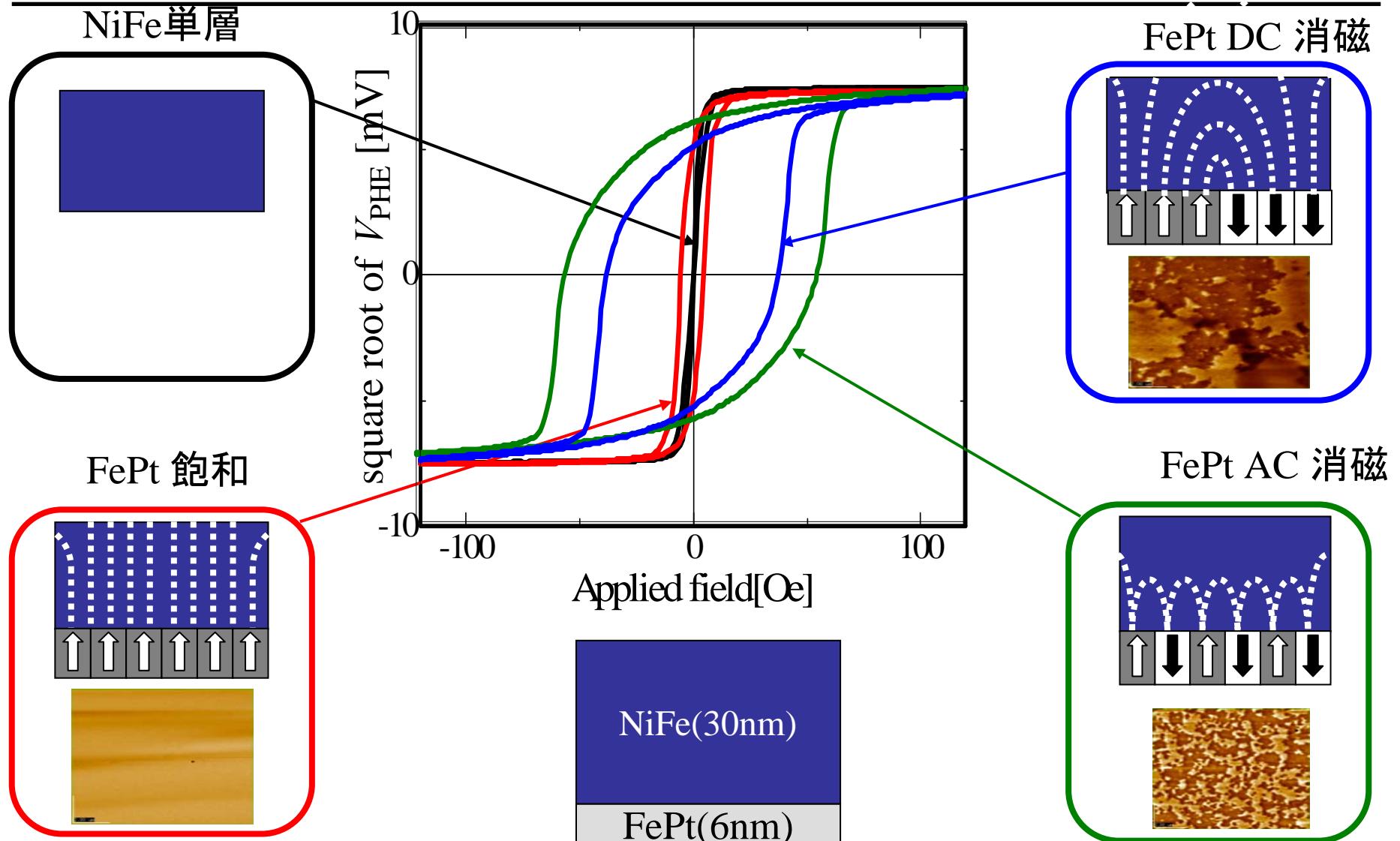
NiFe/Si/FePt Si中間層厚依存性

① FePtの磁化状態を変化させる



FePtの磁化状態を
変化させないようにするため

NiFe(30nm)/FePt(6nm)



FePtの磁化状態によって保磁力が変化

まとめ

● Fe/Pt/X三層膜による第三元素の添加効果を確認

- ▶ 第三元素を添加した膜のFePt(001)ピーク積分強度が増加
- ▶ Au添加膜の垂直保磁力は他の2つの膜に比べて増加
- ▶ Cu添加によりキュリー温度の低減と急峻な熱応答性を実現

● アニール温度変化時のFePtXの特性変化

- ▶ Au添加により規則化温度を500 °Cに低減させることに成功
- ▶ アニール温度を500 °Cに下げることにより R_a 低減を実現

● 記録層-裏打ち層間の磁気的相互作用

- ▶ 記録層/裏打ち層界面での強い交換相互作用（直接接合膜）
 - 記録層 ⇒ 磁化反転機構の変化の検出
 - 裏打ち層 ⇒ 軟磁気特性の劣化

本研究の一部はSRC(情報ストレージ研究推進機構)の
援助を得てなされたものであり、関係者各位に感謝いたします。
また、結晶化ガラス基板のご提供をいただいた
(株)オハラの山口勝彦氏と各種の分析を行っていただいた
TDKの大川秀一氏と野口潔氏に感謝いたします。